

Jahresabschluss, zusammengefasster
Lagebericht und Bestätigungsvermerk
für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2013 bis zum
31. Dezember 2013
der
SÜSS MicroTec AG
Garching

SÜSS MicroTec AG
Garching

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.323.693,37	1.520.180,36
2. geleistete Anzahlung	85.300,07	0,00
	1.408.993,44	1.520.180,36
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksähnliche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.799.595,79	4.731.396,12
2. technische Anlagen und Maschinen	143.907,35	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	487.257,72	410.408,89
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	113.337,15
	14.430.760,86	5.255.142,16
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	53.159.218,18	57.179.218,18
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	19.336.566,87	12.861.025,70
	72.495.785,05	70.040.243,88
	88.335.539,35	76.815.566,40
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon aus Lieferungen und Leistungen € 301.472,25; Vorjahr € 691.960,49)	4.278.180,68	20.970.824,53
2. sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 57.043,96; Vorjahr € 70.684,21)	748.259,19	704.880,21
	5.026.439,87	21.675.704,74
II. Wertpapiere		
sonstige Wertpapiere	2.012.400,00	11.125.620,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	37.183.091,96	17.380.970,21
	44.221.931,83	50.182.294,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten	311.772,77	265.827,34
	132.869.243,95	127.263.688,69

Passiva

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	19.115.538,00	19.115.538,00
II. Kapitalrücklage	82.157.253,73	82.157.253,73
III. Gewinnrücklagen		
1. gesetzliche Rücklage	35.338,09	35.338,09
2. andere Gewinnrücklagen	2.907.501,06	2.907.501,06
	2.942.839,15	2.942.839,15
IV. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn)	-15.056.710,02	5.544.322,16
	89.158.920,86	109.759.953,04
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	34.901,81
2. Steuerrückstellungen	0,00	587.581,54
3. sonstige Rückstellungen	1.940.694,19	2.222.271,60
	1.940.694,19	2.844.754,95
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.180.000,00; Vorjahr € 180.000,00)	11.460.000,00	4.140.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 299.307,78; Vorjahr € 306.063,21)	299.307,78	306.063,21
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 28.222.057,30; Vorjahr € 7.923.241,59)	29.929.037,73	10.084.788,80
4. sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 81.283,39; Vorjahr € 128.128,69; davon aus Steuern € 74.662,46; Vorjahr € 47.828,41; davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 538,15; Vorjahr € 462,90)	81.283,39	128.128,69
	41.769.628,90	14.658.980,70
	132.869.243,95	127.263.688,69

**SÜSS MicroTec AG
Garching**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**

	2013	2012
	€	€
1. Umsatzerlöse	6.433.638,72	8.939.474,43
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.589.725,62	4.857.596,62
	10.023.364,34	13.797.071,05
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.576.019,48	-2.975.107,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 21.739; Vorjahr € 22.672,94)	-300.595,46	-288.524,52
	-2.876.614,94	-3.263.631,94
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-971.278,57	-1.542.153,77
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.499.290,05	-6.845.031,21
6. a) Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	784.559,95	7.079.687,90
b) Erträge aus Beteiligungen	653.342,80	0,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen € 988.359,94; Vorjahr € 673.208,85)	1.432.796,74	1.600.404,06
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-5.620.462,07	-568.957,61
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-18.223.852,34	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 29.243,92; Vorjahr € 101.420,63)	-310.815,45	-787.970,64
	-27.754.998,99	-1.064.021,27
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-20.608.249,59	9.469.417,84
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	272.422,10	-1.693.862,84
13. sonstige Steuern	-265.204,69	-180.813,48
14. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	-20.601.032,18	7.594.741,52
15. Gewinnvortrag aus Vorjahr (Vj. Verlustvortrag)	5.544.322,16	-2.050.419,36
16. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn)	-15.056.710,02	5.544.322,16

SÜSS MicroTec AG, Garching
Anhang für das Geschäftsjahr 2013

A. Allgemeine Angaben

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Ergänzende Bilanzierungsvorschriften aus der Satzung bestehen nicht.

Die SÜSS MicroTec AG, nachstehend auch „Gesellschaft“ genannt, weist zum Abschluss-Stichtag die Größenmerkmale einer großen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 3 Satz 2 HGB auf.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden im Einzelnen folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze angewandt:

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen linear und monatsgenau über die voraussichtliche Nutzungsdauer, wobei diese für Software drei bzw. fünf Jahre beträgt. Die Bemessung der Abschreibungen der anderen Anlagen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt unter Zugrundelegung einer Nutzungsdauer von drei bis fünf Jahren. Der Abschreibungszeitraum richtet sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten bis EUR 410 netto werden nach § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen werden mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen werden mit dem Nennwert bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen waren nicht erforderlich. Zum 31. Dezember 2006 wurde unter den sonstigen Vermögensgegenständen erstmals das langfristige Körperschaftsteuerguthaben in Folge des Gesetzes über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (SESTEG) in Höhe von TEUR 87 aktiviert. Im Geschäftsjahr 2008 wurden auf Grund der Ergebnisse der Betriebsprüfung weitere TEUR 69 aktiviert. Das Guthaben wird in zehn gleichen Jahresbeträgen in den Jahren 2008 bis 2017 ausbezahlt. Da der Auszahlungsbetrag unverzinslich ist, erfolgte eine entsprechende Abzinsung. Dabei wurde ein durchschnittlicher Effektivzinssatz von 3,10 % p.a. zugrunde gelegt.

Wertpapiere werden zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Werten am Bilanzstichtag bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben, die Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach dem Stichtag darstellen.

In Anlehnung an internationale Rechnungslegungsvorschriften wird der Wert der gewährten Aktienoptionen im Personalaufwand und in der Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 2 HGB erfasst. Die entsprechende Dotierung wird zeitanteilig über den Leistungszeitraum von zwei bzw. fünf Jahren gemäß den bestehenden Aktienoptionsplänen verteilt.

Die Pensionsverpflichtung in Höhe von EUR 34.901,81 wurde Mitte des Jahres 2013 ausbezahlt.

Die Rückstellung für Altersteilzeit wurde nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt. Der entsprechende Aktivwert wurde bei der Saldierung gemäß § 246 Abs. 2 HGB mit dem Zeitwert in Höhe von EUR 14.774 berücksichtigt. Dieser Wert stellt gleichzeitig die fortgeführten Anschaffungskosten der Rückdeckungsversicherung dar. Der Erfüllungsbetrag wurde bei der Saldierung in Höhe von EUR 18.867 berücksichtigt. Die Aufwendungen aus der Abzinsung betrugen EUR 0, die Erträge aus der Aufzinsung betrugen EUR 2.455,46. Die Verpflichtung endet zum 30.06.2014.

SÜSS MicroTec AG, Garching
Anhang für das Geschäftsjahr 2013

Auf Differenzen zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen und Schulden sowie auf steuerliche Verlustvorträge wird ein Überhang an aktiven latenten Steuern nicht angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Aufwendungen und Erträge der Gesellschaft sind entsprechend ihrer wirtschaftlichen Verursachung dem jeweiligen Geschäftsjahr zugeordnet.

Zur Umrechnung von Fremdwährungspositionen in der Bilanz wurden die am Bilanzstichtag gültigen mittleren Devisenkurse verwendet. Bei langfristigen Fremdwährungspositionen wurde das Imparitätsprinzip beachtet. Sofern die Gründe für eine vorgenommene Fremdwährungsabwertung nicht mehr bestehen, erfolgt eine Zuschreibung entsprechend dem Wertaufholungsgebot.

C. Erläuterungen und Angaben zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses

Die Zusammensetzung und Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände einschließlich der Abschreibungen im Geschäftsjahr sind dem in der Anlage zum Anhang enthaltenen Anlagenspiegel zu entnehmen.

SÜSS MicroTec AG, Garching
Anhang für das Geschäftsjahr 2013

Der Anteilsbesitz stellt sich zum Bilanzstichtag wie folgt dar:

	Buchwerte				Eigenkapital		Beteiligungs- quote	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag Geschäftsjahr 2013	
	1.1.2013	Zugänge	Abgänge/ Abschreibungen	31.12.2013					
	EUR		EUR	EUR	Währung	Betrag	%	Währung	Betrag
SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching *	30.416.489,04	0,00	0,00	30.416.489,04	EUR	22.502.623,91	100,00%	EUR	-18.223.852,34
SUSS MicroOptics S.A., Hauterive, Schweiz	1.790.192,15	0,00	0,00	1.790.192,15	CHF	8.115.336,00	100,00%	CHF	274.092,00
SUSS MicroTec KK, Yokohama, Japan	50.038,34	0,00	0,00	50.038,34	JPY	-516.905.890,00	100,00%	JPY	-213.511.226,00
SUSS MicroTec Ltd., Coventry, Großbritannien	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	GBP	1.151.154,41	100,00%	GBP	15.766,16
SUSS MicroTec S.a.r.l., Pierre Bénite, Frankreich	67.151,79	0,00	0,00	67.151,79	EUR	965.975,83	100,00%	EUR	86.184,00
SUSS MicroTec Inc., Sunnyvale, USA	23.010.289,78	0,00	-4.020.000,00	18.990.289,78	USD	20.162.069,92	100,00%	USD	-739.750,38
SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim*	28.121,05	0,00	0,00	28.121,05	EUR	990.432,01	100,00%	EUR	784.559,95
SUSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu, Taiwan	135.531,36	0,00	0,00	135.531,36	TWD	216.217.018,00	100,00%	TWD	85.005.665,00
SUSS MicroTec Company Ltd., Shanghai, China	190.240,65	0,00	0,00	190.240,65	CNY	32.177.591,25	100,00%	CNY	5.679.384,02
SUSS MicroTec (Singapore) Pte Ltd., Singapur	12.725,88	0,00	0,00	12.725,88	SGD	618.276,81	100,00%	SGD	-464.113,88
SUSS MicroTec Korea Co Ltd., Seoul, Korea	28.436,14	0,00	0,00	28.436,14	KRW	2.084.513.221,00	100,00%	KRW	1.121.855.551,00
SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co KG, Sternenfels	1,00	0,00	0,00	1,00	EUR	356.400,99	100,00%	EUR	344.129,30
SUSS MicroTec Photomask Equipment Beteiligungs GmbH, Sternenfels	1,00	0,00	0,00	1,00	EUR	15.885,13	100,00%	EUR	491,61
mittelbare Beteiligungen:									
HUGLE Lithography Inc., San Jose, USA					USD	-39.579,00	53,00%	USD	-1.968,00
SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona, USA					USD	-3.047.422,43	100,00%	USD	-6.783.485,22
Gesamt	57.179.218,18	0,00	-4.020.000,00	53.159.218,18					

* Jahresüberschuss / -fehlbetrag und Eigenkapital vor Ergebnisabführung

Im Jahresabschluss angewandte Umrechnungskurse:

	2013
	Bilanz
1 EUR vs 1 USD	1,3767
1 EUR vs 1 JPY	144,5100
1 EUR vs 1 GBP	0,8331
1 EUR vs 1 CHF	1,2268
1 EUR vs 1 TWD	41,3366
1 EUR vs 1 SGD	1,7391
1 EUR vs 1 CNY	8,4177
1 EUR vs 1 KRW	1.463,8900

SÜSS MicroTec AG, Garching
Anhang für das Geschäftsjahr 2013

Im Januar 2013 wurde das in den Konzessionen, gewerblichen Schutzrechten und ähnlichen Rechten enthaltene geleaste SAP-System vollständig abgeschrieben. Der Restbuchwert zum 31.12.2012 betrug EUR 73.919.

Zur Finanzierung des 2010 erworbenen Betriebsgrundstücks in Sternenfels hat die SÜSS MicroTec AG am 25. / 28. Mai 2010 einen Darlehensvertrag mit einer lokalen Bank abgeschlossen. Das Darlehen beläuft sich auf EUR 4.500.000 und hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2020. Es wurde am 6. Juli 2010 valutiert und zur Auszahlung gebracht. Zum 31.12.2013 beträgt der Buchwert des Darlehens EUR 3.960.000.

Zur Finanzierung des 2013 neu erworbenen Betriebsgrundstücks in Garching hat die SÜSS MicroTec AG am 23. / 28. Oktober 2013 einen Darlehensvertrag mit der IKB Deutsche Industriebank AG abgeschlossen. Das Darlehen beläuft sich auf EUR 7.500.000 und hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2021. Es wurde am 16. Dezember 2013 valutiert und zur Auszahlung gebracht. Zum 31.12.2013 beträgt der Buchwert des Darlehens EUR 7.500.000.

In 2013 bestanden keine Aktienoptionspläne mehr. Im Geschäftsjahr 2012 wurden noch 14.510 Bezugsrechte aus Aktienoptionsplänen ausgeübt.

Das Gezeichnete Kapital beträgt zum Bilanzstichtag EUR 19.115.538 und ist in 19.115.538 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Gezeichneten Kapital von EUR 1,00 eingeteilt.

Am 31. Dezember 2013 verfügt die Gesellschaft über ein genehmigtes Kapital in Höhe von EUR 9.000.000 (31.12.2012: EUR 9.052.863).

Kapitalrücklage und Jahresüberschuss

In 2013 bestanden keine Aktienoptionspläne mehr. Im Geschäftsjahr 2012 wurden noch 14.510 Aktienoptionen ausgeübt. In diesem Zusammenhang wurden der Kapitalrücklage im Vorjahr EUR 4.353 zugeführt.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR -20.601.032,18 (2012: Jahresüberschuss EUR 7.594.741) erzielt. Die Kapitalrücklage beträgt zum Bilanzstichtag insgesamt EUR 82.157.254 (31.12.2012: EUR 82.157.254).

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
Personalrückstellungen	637.902	1.108.511
Ausstehende Rechnungen	624.181	499.403
Jahresabschlusskosten	170.600	120.200
Aufsichtsratsvergütung	147.990	147.990
Erwerb 15% SMO, Bonus Purchase Price	360.021	346.168
Gesamt	1.940.694	2.222.272

SÜSS MicroTec AG, Garching
Anhang für das Geschäftsjahr 2013

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen:

	Gesamtbetrag	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.460.000	1.180.000	4.720.000	5.560.000
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	299.308	299.308	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	29.929.038	28.222.057	1.706.981	0
Sonstige Verbindlichkeiten	81.283	81.283		0
Gesamt	41.769.629	29.782.648	6.426.981	5.560.000

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen zwei Darlehen zur Finanzierung der Betriebsgrundstücke in Garching und in Sternenfels. Für jedes dieser Darlehen wurden Sicherheiten in Form von Grundschulden gestellt

Die Risiken des variablen Zinssatzes des Darlehens Sternenfels werden durch einen Zinsswap eliminiert. Die gegenläufigen Wertveränderungen gleichen sich aus. Zum Stichtag betrug der nicht bilanzierte Marktwert des Zinsswaps -344 TEUR (2012: -506 TEUR). Das Darlehen zur Finanzierung des Betriebsgrundstücks in Garching ist mit einem fixen Zinssatz belegt.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen die Weiterberechnung der bei der SÜSS MicroTec AG entstandenen Aufwendungen an die Unternehmen der SÜSS Gruppe.

Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen und Regionen:

Region	Mgmt- verrechnung	Marketing- verrechnung	Versicherungs- verrechnung	Sonstige
	EUR	EUR	EUR	EUR
Deutschland	2.282.474	234.738	201.568	1.623.185
EU	56.112	2.331	1.933	19.337
Amerika	897.555	1.223	23.905	79.897
Japan	136.417	14.646	6.985	0
Asien	462.829	855	14.076	184.870
Sonstige	183.773	-1.894	6.824	
Gesamt	4.019.160	251.899	255.291	1.907.289

Die unter der Spalte „Sonstige“ ausgewiesenen Umsatzerlöse enthalten im Wesentlichen die Weiterbelastung von SAP Aufwendungen in Höhe von EUR 1.262.869 sowie die Weiterbelastung von Lizenzgebühren in Höhe von EUR 303.785.

Sonstige betriebliche Erträge

Im Wesentlichen ist diese Position durch Fremdwährungsgewinne in Höhe von EUR 1.519.880,75 (2012: EUR 1.894.696) und durch Mieterlöse in Höhe von EUR 1.464.352,83 (2012: EUR 1.108.847) geprägt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Wesentlichen beinhaltet diese Position Rechts- und Beratungskosten, Instandhaltungskosten und sonstige Verwaltungskosten. Im Vorjahr beinhaltete diese Position Fremdwährungsverluste in Höhe von EUR 1.450.025,10.

Erträge aus Gewinnabführungsverträgen

Die ausgewiesenen Erträge resultieren aus dem am 24. April 2008 abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrag mit der SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim.

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

Im Berichtsjahr wurden Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von EUR 5.611.742,07 (2012: EUR 568.958) erfasst. Davon entfielen EUR 1.591.742,07 (2012: EUR 568.598) auf Ausleihungen an verbundene Unternehmen in Fremdwährung, die allein aufgrund von Wechselkursveränderungen vorgenommen wurden. Darüber hinaus wurde der Beteiligungsbuchwert der SUSS MicroTec, Inc., Sunnyvale (USA) im Berichtsjahr um EUR 4.020.000,00 wertberichtigt. Die Konzernplanung sieht bei der SUSS MicroTec, Inc. einen leicht wachsenden Umsatz für die kommenden Jahre vor. Allerdings wird die Gesellschaft zukünftig – aufgrund der Änderung des Geschäftsmodells der SUSS MicroTec, Inc. – lediglich eine für eine Vertriebsgesellschaft übliche EBIT-Marge erzielen. Entsprechend zeigt das zur Überprüfung der Werthaltigkeit von Finanzanlagen verwendete Modell eine Abwertung auf den Beteiligungsansatz an dieser Gesellschaft um rund TEUR 4.020 an.

Aufwendungen aus Verlustübernahme

Die ausgewiesenen Aufwendungen aus Verlustübernahme resultieren aus dem seit 01.01.2011 gültigen Ergebnisabführungsvertrag mit der SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching.

D. Derivative Finanzinstrumente und Bewertungseinheiten

Derivative Finanzinstrumente werden innerhalb der SÜSS MicroTec AG zum Zweck der Absicherung von Zinsänderungsrisiken für ein Immobiliendarlehen eingesetzt. Darüber hinaus schließt die Gesellschaft Währungstermingeschäfte ab. Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, werden Finanzinstrumente mit dem abgesicherten Grundgeschäft zu einer Bewertungseinheit zusammengefasst.

Bei der Bildung von Bewertungseinheiten werden die Zahlungsströme aus dem Grund- und Sicherungsgeschäft einander gegenübergestellt und nur ein negativer Überhang aus dem ineffektiven Teil der Marktwertveränderungen zurückgestellt. Die unrealisierten Gewinne und Verluste aus dem effektiven Teil gleichen sich vollständig aus und werden weder bilanziell noch ergebniswirksam erfasst.

Die Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten, für die keine Bewertungseinheit mit dem Grundgeschäft gebildet wird, erfolgt dagegen imparitätisch. Somit werden für negative Marktwerte Rückstellungen gebildet, positive Marktwerte werden nicht angesetzt.

Derivative Finanzinstrumente mit Bildung von Bewertungseinheiten

Das im Geschäftsjahr 2010 aufgenommene Darlehen, das der Finanzierung des Grundstücks in Sternenfels dient, weist einen variablen Zins aus. Zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos wurde ein laufzeitkongruenter Zinsswap abgeschlossen.

SÜSS MicroTec AG, Garching
Anhang für das Geschäftsjahr 2013

Die Höhe des Grundgeschäfts (Darlehensvertrag) sowie der Nennbetrag des Zinsswaps beliefen sich bei Abschluss des Sicherungsgeschäfts auf 4,5 Mio. €. Darlehensvertrag und Zinsswap weisen eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2020 auf. Der Nennbetrag des Zinsswaps reduziert sich analog zum Darlehensbetrag, von dem jährlich 180 TEUR getilgt werden, und entspricht somit während der gesamten Laufzeit dem Nennbetrag des Grundgeschäfts. Mit dem Zinsswap wird der variable Zins des Darlehens getauscht gegen einen fixen Zinssatz. Nach Absicherung durch den Zinsswap ergibt sich aus dem Darlehen (synthetisch) ein fester Zinssatz von 3,98 %.

Zum Stichtag beträgt der nicht bilanzierte Marktwert des Zinsswaps EUR -343.864,93 (2012: EUR -506.268).

Derivative Finanzinstrumente ohne Bildung von Bewertungseinheiten

Die SÜSS MicroTec AG schließt bei Bedarf Währungstermingeschäfte ab, um das Wechselkursrisiko aufgrund eingehender Zahlungen aus Warenlieferungen und Darlehenstilgungen in japanischen Yen und US-Dollar abzusichern.

Zum Bilanzstichtag bestanden keine offenen Termingeschäfte.

E. Beziehungen zu verbundenen Unternehmen und Beteiligungsunternehmen

Die SÜSS MicroTec AG mit Sitz in Garching ist Konzernobergesellschaft.

Bezüglich der Angaben zu den Konzerngesellschaften verweisen wir auf unsere Ausführungen im Abschnitt C.

F. Sonstige Angaben

Der Vorstand der Gesellschaft setzte sich im Geschäftsjahr 2013 wie folgt zusammen:

Frank Averdung, Diplom-Elektroingenieur, Feldkirchen, Vorstandsvorsitzender

Zuständigkeitsbereiche: Vertrieb, Marketing, Produktion, Forschung und Entwicklung, Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement, Umweltschutz, Patentwesen und Konzernstrategie, Investor Relations

weitere Mandate: VDMA Fachverband Productronic, Frankfurt am Main (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender)

VDMA (Mitglied im Hauptvorstand)

Semi European Advisory Board (Mitglied)

IMS Nanofabrication AG, Wien (Mitglied des Aufsichtsrats)

Michael Knopp, Diplom-Kaufmann, Ratingen, Mitglied des Vorstands

Zuständigkeitsbereiche: Finanz- und Rechnungswesen, Informatik, Recht, Steuern und Versicherungen, Personal, Facility Management, Materialwirtschaft und Logistik

weitere Mandate: keine

Die Bezüge des Vorstandes enthalten fixe und variable Bestandteile. Als fixe Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder monatliche Gehaltszahlungen, Zuschüsse zur Sozialversicherung sowie einen Firmenwagen mit privater Nutzungsmöglichkeit.

SÜSS MicroTec AG, Garching
Anhang für das Geschäftsjahr 2013

Als variable Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder einen Jahresbonus, der sich an individuell festgelegten Zielen orientiert.

Im Berichtsjahr wurden an Herrn Averdung und Herrn Knopp keine Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft ausgegeben.

Für Pensionsverpflichtungen gegenüber einem ehemaligen Vorstandsmitglied der Gesellschaft bestand 2012 eine Pensionsrückstellung in Höhe von EUR 34.902, die Mitte des Jahres 2013 ausbezahlt wurde.

Der Aufsichtsrat hat sich im Berichtsjahr wie folgt zusammengesetzt:

Dr. Stefan Reineck, Kirchardt, Geschäftsführender Gesellschafter der RMC Dr. Reineck Management & Consulting GmbH, Aufsichtsratsvorsitzender

weitere Mandate: AttoCube Systems AG, München (Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
 Phoseon Technology Inc., Hillsboro, Oregon, USA (Mitglied im Board of Directors)
 Wittenstein AG, Igersheim (Mitglied im Aufsichtsrat)
 ASW Group AG, Heilbronn (Mitglied im Aufsichtsrat)

Jan Teichert, Metten, Mitglied des Vorstands der Einhell Germany AG, Landau / Isar; stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats

weitere Mandate: ab 1. Januar 2014 Kolb Technology GmbH, Hengersberg (Mitglied des Beirats)

Gerhard Pegam, Au bei Bad Aibling, Geschäftsführender Gesellschafter der GPA Consulting GmbH; Aufsichtsratsmitglied

Weitere Mandate: OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats)
 Schaffner Holding AG, Solothurn/CH (Mitglied des Verwaltungsrats)

Vergütung Vorstand und Aufsichtsrat

Die Mitglieder des Vorstands erhielten eine Barvergütung in Höhe von EUR 793.448 (2012: EUR 1.252.594).

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats betrug einschließlich Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen EUR 160.435 (2012: EUR 160.678).

Individualisierte Angaben zur Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrates sind im Vergütungsbericht, der Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts ist, dargestellt.

SÜSS MicroTec AG, Garching
Anhang für das Geschäftsjahr 2013

Der Aktienbesitz des Vorstands und des Aufsichtsrats setzt sich für das Geschäftsjahr 2013 wie folgt zusammen:

Aktienbesitz der Organmitglieder	Aktienanzahl		Bezugsrechte	
	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012
Frank Averdung	90.540	83.200	0	0
Michael Knopp	28.100	22.500	0	0
Dr. Stefan Reineck	9.600	9.600	0	0
Jan Teichert	0	0	0	0
Gerhard Pegam	0	0	0	0

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2013 werden im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gegeben.

Die SÜSS MicroTec AG stellt in Anwendung von § 315a HGB einen Konzernabschluss nach IFRS auf. Der Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2013 werden im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

G. Latente Steuern

Nach dem Temporary-Konzept in der Ausgestaltung des BilMoG werden die latenten Steuern für Differenzen zwischen den handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen für alle Bilanzposten ermittelt. Die aktiven latenten Steuern sind im Wesentlichen auf unterschiedliche Ansätze im Bereich der Anteile an verbundenen Unternehmen und der Ausleihungen an verbundene Unternehmen sowie auf den Verlustvortrag zurückzuführen. Die passiven latenten Steuern entfallen im Wesentlichen auf unterschiedliche Ansätze im Rahmen der Fremdwährungsbewertung.

Da die SÜSS MicroTec AG als Organträgerin auch Steuerschuldnerin für die verbundenen Unternehmen ist, mit denen ein Ergebnisabführungsvertrag besteht, werden bei der Ermittlung der latenten Steuern auch deren Differenzen berücksichtigt. Die SÜSS MicroTec AG ist außerdem als Mitunternehmer an einer Personengesellschaft beteiligt. Die latenten Steuern auf die Differenz zwischen den handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen, sind, soweit es die Körperschaftsteuer betrifft, ebenfalls bei der SÜSS MicroTec AG auszuweisen. Auf Organgesellschaftsebene führen die Differenzen zu einem leichten Überhang an passiven latenten Steuern.

Die Ermittlung der latenten Steuern auf die o.g. Differenzen erfolgt mit einem durchschnittlichen Ertragsteuersatz von 28,25 % bzw. 15,83 %. Nach der Verrechnung der aktiven und passiven latenten Steuern verbleibt ein aktiver Überhang, der gemäß dem Ansatzwahlrecht nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB nicht aktiviert wurde.

H. Honorare des Abschlussprüfers

Wir verweisen bezüglich der Honorare des Abschlussprüfers gemäß § 285 Nr.17 HGB auf den Konzernabschluss der Gesellschaft.

SÜSS MicroTec AG, Garching
Anhang für das Geschäftsjahr 2013

I. Zahl der Beschäftigten

Die SÜSS MicroTec AG hatte im Geschäftsjahr 2013 durchschnittlich 20 Arbeitnehmer (2012: 20), davon, wie im Vorjahr, 12 männliche und acht weibliche. Es handelt sich um Mitarbeiter im Verwaltungsbereich.

J. Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Durch den Erwerb des Betriebsgrundstücks in Garching entfallen die Mietverpflichtungen gegenüber der SÜSS MicroTec Lithography GmbH. Es bestehen Leasingverpflichtungen in Höhe von EUR 77.339 gegenüber Dritten bis zum Jahr 2016. Die finanzielle Restverpflichtung für den abgeschlossenen Sale and Lease Back Vertrag für das implementierte SAP-System in Höhe von EUR 77.055 ist im Januar 2013 erloschen.

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften

Die von dem Bankenkonsortium unter Führung der BayernLB und unter Beteiligung der Deutschen Bank AG sowie der DZ Bank AG bereitgestellte Kredit- und Avallinie in Höhe von EUR 7,5 Mio. lief bis zum 31. März 2013.

Zum 1. April 2013 haben die SÜSS MicroTec AG und die SÜSS MicroTec Lithography GmbH mit dem Bankenkonsortium neue Kreditverträge abgeschlossen. Mit den neuen Kreditverträgen wurden Kredit- und Avallinien von insgesamt EUR 4,5 Mio. vereinbart. Die neuen Kreditlinien wurden bis auf weiteres gewährt und wurden ohne Covenants gestellt. Sie dienen in erster Linie der Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften. Die SÜSS MicroTec AG hat sich für eine Reduzierung der Avallinien entschieden, da die bisher zur Verfügung stehenden Linien nicht ausgeschöpft wurden.

Es besteht wie bereits im Vorjahr eine Rückbürgschaft für einen Kautionsversicherungsvertrag der Tochtergesellschaften SÜSS MicroTec Lithography GmbH und SÜSS MicroTec REMAN GmbH. Der Bürgschaftsrahmen dieses Kautionsversicherungsvertrages beläuft sich auf EUR 2,5 Mio. Der Kautionsversicherungsvertrag läuft bis auf weiteres. Zur Sicherung dieser Linie hat die SÜSS MicroTec AG ein Festgeldkonto bei der UniCredit (HVB) in Höhe von EUR 350.000 an die Versicherungsgesellschaft abgetreten.

Zum Bilanzstichtag sind die Linien in Höhe von TEUR 3.171 (Vorjahr: T€ 1.913) in Form von Avalen genutzt. Zur Sicherung der Kredit- und Avallinien bei dem bestehenden Bankenkonsortium wurde der Bestand an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen der SÜSS MicroTec Lithography GmbH abgetreten.

Gewährleistungsverträge

Im Mai 2010 hat die SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co.KG mit der BW Bank Mannheim einen Rahmenkreditvertrag abgeschlossen, mit dem eine Kreditlinie in Höhe von EUR 1 Mio. gestellt wird. Die Kreditlinie läuft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne Covenants gestellt. Die SÜSS MicroTec AG hat zur Besicherung der Kreditlinie eine harte Patronatserklärung für die SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co.KG abgegeben.

Für die finanzielle Absicherung der Unternehmensfortführung der SÜSS MicroTec (Singapore) Pte Ltd., Singapur, besteht wie bereits im Vorjahr eine Garantieerklärung, die ihre Gültigkeit behält solange sie nicht widerrufen wird.

Für die finanzielle Absicherung der Unternehmensfortführung der SÜSS MicroTec S.a.r.l., Frankreich, besteht wie bereits im Vorjahr eine Garantieerklärung, die ihre Gültigkeit behält solange sie nicht widerrufen wird.

SÜSS MicroTec AG, Garching
Anhang für das Geschäftsjahr 2013

Im Vorjahr bestand für die finanzielle Absicherung der Unternehmensfortführung der SÜSS MicroTec KK, Japan, eine Garantieerklärung, die zum 25. Januar 2013 ausgelaufen ist. Es wurde eine weiterführende Garantieerklärung für den Zeitraum von einem Jahr bis zum 17. Januar 2014 abgegeben.

Aufgrund der nachhaltig positiven Ertragslage der Gesellschaften rechnen wir nicht mit einer Inanspruchnahme aus den abgegebenen Garantien und Patronatserklärungen.

K. Mitteilungen nach WpHG

Im Geschäftsjahr wurden gegenüber der Gesellschaft folgende Mitteilungen gemäß § 21 Abs. 1 WpHG i.V.m. § 32 Abs. 2 InvG gemacht:

Die DWS Invest SICAV, Luxemburg, Luxemburg, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 19. August 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 13. August 2013 die Schwelle von 3% unterschritten hat und zu diesem Tag 2,92 % beträgt (557.233 Stimmrechte).

Die DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 23. August 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. August 2013 die Schwelle von 5% und gleichzeitig die Schwelle von 3% unterschritten hat und zu diesem Tag 0% beträgt (0 Stimmrechte).

Die UBS AG, Zürich, Schweiz, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 26. August 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 20. August 2013 die Schwellen von 3% und 5% überschritten hat und zu diesem Tag 9,98 % beträgt (1.907.818 Stimmrechte). Davon sind ihr 0,02 % (3.322 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Die UBS AG, Zürich, Schweiz, hat uns gemäß § 25a WpHG am 26. August 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 20. August 2013 die Schwellen von 5% und 10% überschritten hat und zu diesem Tag 10,57 % beträgt (2.021.180 Stimmrechte). Davon sind ihr 9,98 % (1.907.818 Stimmrechte) nach § 21 bzw. § 22; 0,58% (111.574 Stimmrechte) nach § 25a WpHG und 0,01% (1.788 Stimmrechte) nach § 25 WpHG zuzurechnen.

Die UBS AG, Zürich, Schweiz, hat uns gemäß § 25 WpHG am 26. August 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 20. August 2013 die Schwelle von 5% überschritten hat und zu diesem Tag 9,99 % beträgt (1.909.606 Stimmrechte). Davon sind ihr 9,98 % (1.907.818 Stimmrechte) nach § 21 bzw. § 22 und 0,01% (1.788 Stimmrechte) nach § 25 WpHG zuzurechnen.

Die UBS AG, Zürich, Schweiz, hat uns gemäß § 25a WpHG am 27. August 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 22. August 2013 die Schwelle von 10% unterschritten hat und zu diesem Tag 9,96 % beträgt (1.903.098 Stimmrechte). Davon sind ihr 9,35 % (1.787.630 Stimmrechte) nach § 21 bzw. § 22; 0,59% (113.680 Stimmrechte) nach § 25a WpHG und 0,01% (1.788 Stimmrechte) nach § 25 WpHG zuzurechnen.

Die UBS AG, Zürich, Schweiz, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 05. September 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 02. September 2013 die Schwellen von 5% unterschritten hat und zu diesem Tag 4,65 % beträgt (889.826 Stimmrechte). Davon sind ihr 0,02 % (3.322 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Die UBS AG, Zürich, Schweiz, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 13. September 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 10. September 2013 die Schwelle von 3% unterschritten hat und zu diesem Tag 2,92 % beträgt (557.992 Stimmrechte). Davon sind ihr 0,02 % (3.322 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Die Schroders PLC, London, Großbritannien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 04. Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 02. Oktober 2013 die Schwelle von 3% überschritten hat und zu diesem Tag 3,11 % beträgt (594.407 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,11 % (594.407 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

SÜSS MicroTec AG, Garching
Anhang für das Geschäftsjahr 2013

Die Schroder Administration Limited, London, Großbritannien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 04. Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 02. Oktober 2013 die Schwelle von 3% überschritten hat und zu diesem Tag 3,11 % beträgt (594.407 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,11 % (594.407 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die Schroder Investment Management Ltd, London, Großbritannien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 04. Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 02. Oktober 2013 die Schwelle von 3% überschritten hat und zu diesem Tag 3,11 % beträgt (594.407 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,11 % (594.407 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Der Vanguard Whitehall Funds, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 09. Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 03. Oktober 2013 die Schwelle von 3% überschritten hat und zu diesem Tag 3,196 % beträgt (611.000 Stimmrechte).

Die Henderson Group Plc, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 27. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5% überschritten hat und zu diesem Tag 5,13 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,13% (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3% oder mehr direkt von der Henderson Horizon Fund – Pan European Smaller Companies Fund gehalten.

Der Henderson Horizon Fund – Pan European Smaller Companies Fund, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. Januar 2014 mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 3% überschritten hat und zu diesem Tag 3,17 % beträgt (606.922 Stimmrechte).

Die Henderson Global Investors (Holdings) PLC, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5% überschritten hat und zu diesem Tag 5,13 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,13% (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3% oder mehr direkt von der Henderson Horizon Fund – Pan European Smaller Companies Fund gehalten.

Die Henderson Global Investors Limited, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5% überschritten hat und zu diesem Tag 5,13 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,13% (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3% oder mehr direkt von der Henderson Horizon Fund – Pan European Smaller Companies Fund gehalten.

Die Baillie Gifford & Co, Edinburgh, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 27. Februar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 26. Februar 2014 die Schwelle von 3% überschritten hat und zu diesem Tag 3,003 % beträgt (574.032 Stimmrechte). Davon sind ihr 1,275% (243.632 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG und 1,728% (330.400 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG sowie § 22 Abs. 1 Satz 2 (via Baillie Gifford Overseas Limited) zuzurechnen.

L. Angabe der Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex nach § 161 AktG

Wie bereits in den Vorjahren haben Vorstand und Aufsichtsrat im Januar 2013 eine Entsprechenserklärung gemäß §161 AktG abgegeben und erklärt, dass sie den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 15. Mai 2012 mit vier Ausnahmen – Einladung zur Hauptversammlung, Selbstbehalt bei D&O-Versicherungen, Bildung von Ausschüssen und Benennung von Zielen für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats – entsprechen werden und den Empfehlungen des

SÜSS MicroTec AG, Garching
Anhang für das Geschäftsjahr 2013

Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010 seit der Abgabe der letzten jährlichen Entsprechenserklärung im Mai 2012 mit den darin angegebenen Ausnahmen entsprochen haben.

Im Januar 2014 haben Vorstand und Aufsichtsrat eine Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben und erklärt, dass sie den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate-Governance-Kodex in der Fassung vom 13. Mai 2013 mit folgenden Ausnahmen – Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, Vertikaler Vergütungsvergleich, Versorgungszusagen, Bildung von Ausschüssen und Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats – entsprechen werden. Ferner haben Vorstand und Aufsichtsrat erklärt, dass sie den Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 15. Mai 2012 seit der Abgabe der letzten jährlichen Entsprechenserklärung im Januar 2013 mit den darin angegebenen Ausnahmen entsprochen haben.

Die Entsprechenserklärungen wurden im Internet unter www.suss.com dauerhaft zugänglich gemacht.

Garching, 10. März 2014



Frank Averdung
Vorsitzender des Vorstandes



Michael Knopp
Vorstand

Anlagenspiegel SÜSS MicroTec AG, Garching, 2013

	Historische Anschaffungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	1.1.2013 €	Zugänge €	Umgliederungen €	Abgänge €	31.12.2013 €	1.1.2013 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2013 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.918.825,86	338.138,67	0,00	3.763.822,66	3.493.141,87	5.398.645,50	533.725,54	3.762.922,54	2.169.448,50	1.323.693,37	1.520.180,36
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	85.300,07	0,00	0,00	85.300,07	0,00	0,00	0,00	0,00	85.300,07	0,00
	6.918.825,86	423.438,74	0,00	3.763.822,66	3.578.441,94	5.398.645,50	533.725,54	3.762.922,54	2.169.448,50	1.408.993,44	1.520.180,36
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksähnliche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.162.760,69	9.186.705,17	111.889,80	0,00	14.461.355,66	431.364,57	230.395,30	0,00	661.759,87	13.799.595,79	4.731.396,12
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	145.746,94	1.447,35	0,00	147.194,29	0,00	3.286,94		3.286,94	143.907,35	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.065.321,77	280.719,62	0,00	171.116,01	1.174.925,38	654.912,88	203.870,79	171.116,01	687.667,66	487.257,72	410.408,89
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	113.337,15	0,00	-113.337,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.337,15
	6.341.419,61	9.613.171,73	0,00	171.116,01	15.783.475,33	1.086.277,45	437.553,03	171.116,01	1.352.714,47	14.430.760,86	5.255.142,16
III. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	74.997.031,65	0,00	0,00	0,00	74.997.031,65	17.817.813,47	4.020.000,00	0,00	21.837.813,47	53.159.218,18	57.179.218,18
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	13.429.983,31	8.067.283,24	0,00	0,00	21.497.266,55	568.957,61	1.591.742,07	0,00	2.160.699,68	19.336.566,87	12.861.025,70
	88.427.014,96	8.067.283,24	0,00	0,00	96.494.298,20	18.386.771,08	5.611.742,07	0,00	23.998.513,15	72.495.785,05	70.040.243,88
	101.687.260,43	18.103.893,71	0,00	3.934.938,67	115.856.215,47	24.871.694,03	6.583.020,64	3.934.038,55	27.520.676,12	88.335.539,35	76.815.566,40

ZUSAMMENGEFASSTER LAGEBERICHT

der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2013

035 Geschäft und Rahmenbedingungen

035 KONZERNSTRUKTUR UND GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

037 UNTERNEHMENSSTEUERUNG, ZIELE UND STRATEGIE

037 FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

040 ÜBERBLICK ÜBER DEN GESCHÄFTSVERLAUF

046 Ertrags-, Finanz-, und Vermögenslage

046 ERTRAGSLAGE

049 FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

052 GESAMTAUSSAGE ZUR WIRTSCHAFTLICHEN LAGE

052 INVESTITIONEN

052 DIE HOLDING – SÜSS MICROTEC AG

054 Übernahmerechtliche Angaben

054 ANGABEN GEMÄß § 289 ABS. 4 HGB UND § 315 ABS. 4 HGB

056 Erklärung zur Unternehmensführung -gemäß § 289a HGB

056 Vergütungsbericht

056 VERGÜTUNG DES VORSTANDS

059 VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS

059 Nachtragsbericht

059 STIMMRECHTSMITTEILUNGEN NACH DEM STICHTAG

060 Berichterstattung über die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

060 RISIKOMANAGEMENT-SYSTEM

062 ALLGEMEINE WIRTSCHAFTLICHE RISIKEN UND BRANCHENRISIKEN

063 BETRIEBLICHE RISIKEN

064 FINANZMARKTRISIKEN

066 PROGNOSEBERICHT

070 Zukunftsgerichtete Angaben

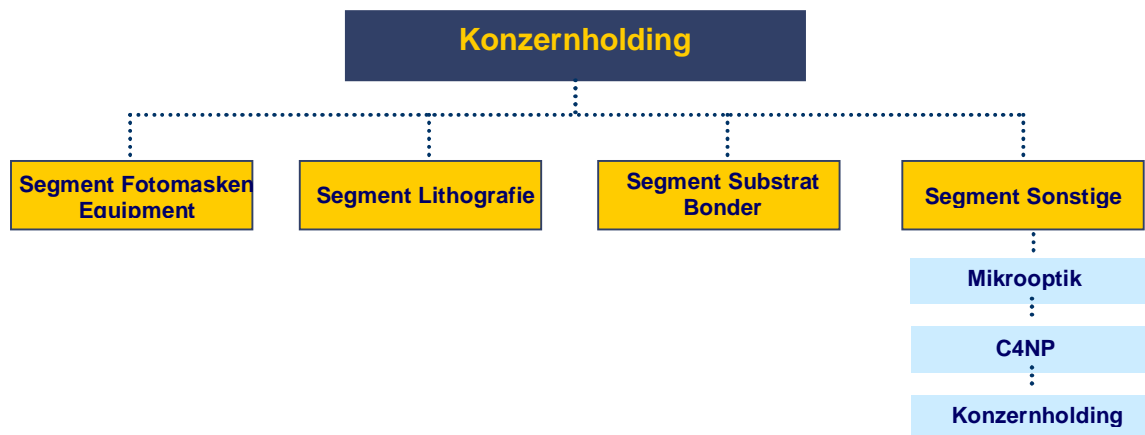
Geschäft und Rahmenbedingungen

KONZERNSTRUKTUR UND GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND GESCHÄFTSFELDER

Der SÜSS MicroTec-Konzern entwickelt, fertigt und vertreibt Anlagen für die Herstellung von Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik. Als Zulieferer von Systemlösungen für die Halbleitertechnik ist die Gruppe als leistungsstarker Partner der Halbleiterindustrie für den Labor- und den Produktionsbereich tätig. Wachstumsstarke Spezialmärkte bilden die Tätigkeitsschwerpunkte und fördern die innovative Technologieentwicklung mit langfristigem Erfolgspotenzial für zukunftsorientierte Märkte und Anwendungen. Im Mittelpunkt stehen die Aufbau- und Verbindungstechnik von Mikrochips bei Anwendungen in der Chipfertigung, der Telekommunikation und der optischen Datenübertragung. Größere Prozesslinien bestehen in der Regel aus mehreren Einzelgeräten, wo die Gruppe mit internen und externen Partnern Netzwerke zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen bildet und nutzt.

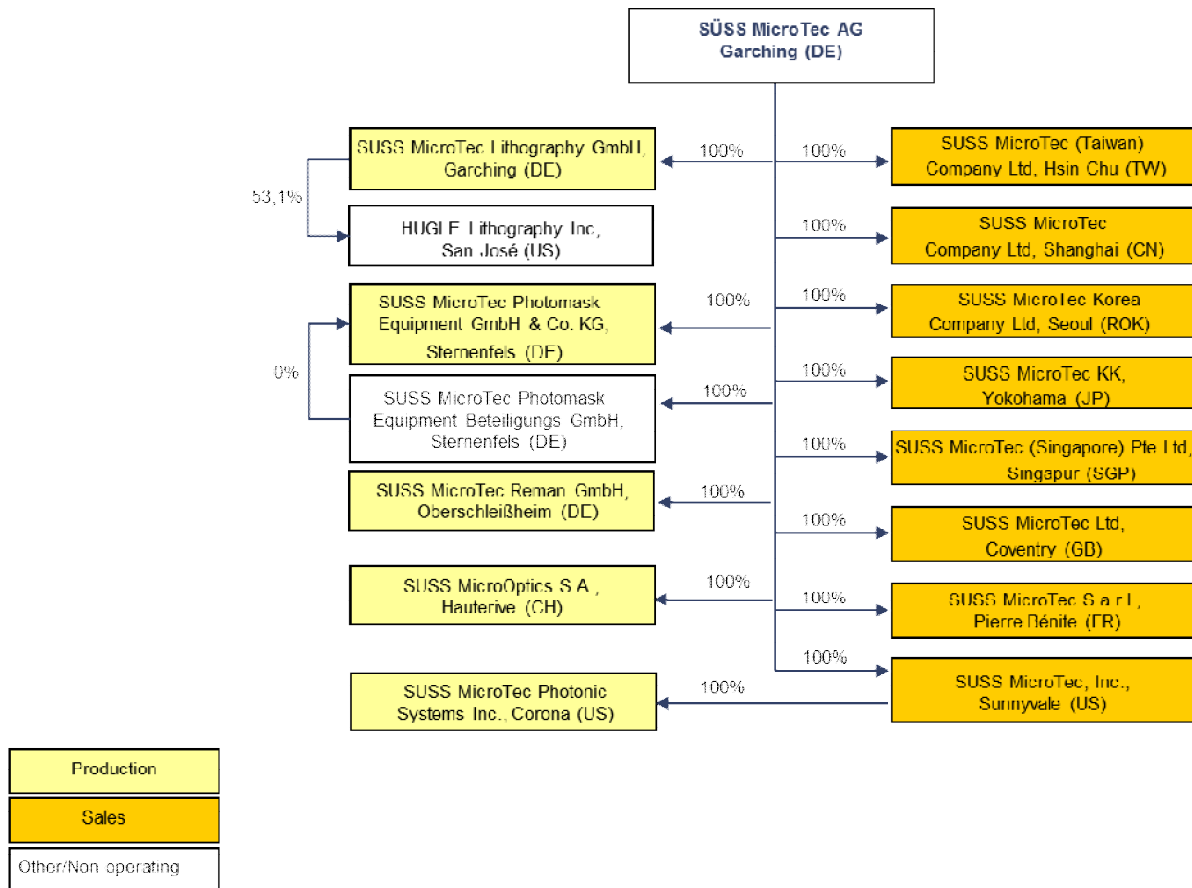
Der Konzern ist zum 31. Dezember 2013 in vier Segmente eingeteilt, wobei das Segment „Sonstige“ aus mehreren kleineren Teileinheiten besteht, die jeweils getrennt geleitet werden. Durch die Akquisition der HamaTech APE GmbH & Co. KG (nach Umfirmierung: SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG) wurde im Geschäftsjahr 2010 ein neues Segment – Fotomasken Equipment – geschaffen. Die im März 2012 akquirierte Tamarack Scientific Co., Inc. (nach Umfirmierung: SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc.) ist im Segment Lithografie angesiedelt.



RECHTLICHE KONZERNSTRUKTUR

Die rechtliche Konzernstruktur besteht aus der Muttergesellschaft, der SÜSS MicroTec AG als Management- und Finanzierungsholding, sowie den in der Regel mehrheitlich in Besitz der Muttergesellschaft stehenden Tochtergesellschaften. In den Tochtergesellschaften sind jeweils Entwicklungs- und Produktionstätigkeiten oder auch lokale Vertriebs- und Servicetätigkeiten für den Konzern organisiert. Die Gruppe verfügt über Standorte in Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich, der Schweiz, Japan, China, Singapur, Korea und Taiwan.

Daneben besteht noch eine geringfügige Beteiligung von zehn Prozent an der ELECTRON MEC S.R.L., Mailand (IT). Diese geringfügige Beteiligung hat nur unwesentliche Bedeutung für das operative Geschäft.



LEITUNG UND KONTROLLE

Vergütungsstruktur für die Organmitglieder

Der Vorstand erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Festvergütung sowie eine variable Vergütung, die bei Erreichen individuell festgelegter Ziele gezahlt wird. In den Festbezügen enthalten sind Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens mit privater Nutzungsmöglichkeit und Zuschüsse zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. Verantwortung bestimmt. Den Mitgliedern des Vorstands sind zusätzlich Versorgungszusagen in Form von Direktversicherungen gemacht worden. Die variable Vergütung enthält kurzfristige und auch langfristige Komponenten, nähere Hinweise hierzu sind im Vergütungsbericht zu finden.

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 19 der Satzung der SÜSS MicroTec AG geregelt. Gemäß § 19 der Satzung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats folgende Vergütung: Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 1.500 € pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, die sich an der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats 45.000 €, sein Stellvertreter 40.000 € und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 35.000 € pro Geschäftsjahr als feste Vergütung.

UNTERNEHMENSSTEUERUNG, ZIELE UND STRATEGIE

Die Unternehmenssteuerung orientiert sich insbesondere an Auftragseingang, Umsatz und Auftragsbestand der einzelnen Segmente. Die Leistungsfähigkeit der Segmente wird dabei vor allem durch Beobachtung der Entwicklung der Rohertragsmarge (Umsatz abzüglich der Herstellungskosten) sowie des Segmentergebnisses gemessen. Die Darstellung des Segmentergebnisses enthält auch Erträge und Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung und aus Anlagenabgängen. In der Summe entsprechen die Ergebnisse der Segmente dem operativen Ergebnis (EBIT) des Konzerns.

Weitere Steuerungskennzahl ist die Nettoliquidität (flüssige Mittel zuzüglich verzinslicher Wertpapiere und abzüglich Finanzschulden), die eine wesentliche Steuerungsgröße für die Finanzierungsfunktion der Holding darstellt.

SÜSS MicroTec verfolgt die Besetzung lukrativer Spezialmärkte in der Industrie der Halbleiterausrüster als Strategie. Ziel ist es, durch eine klare Positionierung stets innerhalb der Top-3-Anbieter in den relevanten Märkten zu agieren. Partnerschaften mit führenden Instituten und Unternehmen der Industrie sollen sicherstellen, dass wesentliche Trends oder zukunftssträchtige Technologien stets rechtzeitig erkannt und auf deren Potenziale für SÜSS MicroTec überprüft werden. Im Vordergrund steht dabei organisches Wachstum; im Falle interessanter Technologien oder sinnvoller Komplementärprodukte wird auch externes Wachstum in Betracht gezogen.

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Im Folgenden haben wir eine Übersicht über die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten 2013 nach Segmenten zusammengestellt.

LITHOGRAFIE

Das größte Segment, die Lithografie, vereinigt die Produktlinien Exposure (Mask Aligner, UV-Projektionsgeräte), Laser Processing und die Coater / Developer.

Im Bereich der Belackungs- und Entwicklungssysteme hat SÜSS MicroTec die neueste Generation der 200 mm Plattform für die Volumenproduktion um eine wesentliche Komponente erweitert. Das neue vierfach Ein-/Ausgabemodul erlaubt das kontinuierliche Prozessieren von zwei parallelen Prozessen ohne Unterbrechung. Die modulare Ausbaufähigkeit mit diesem Modul ermöglicht eine weiterführende Optimierung der Cost of Ownership der Coater/Developer Cluster. Der unterbrechungsfreie Betrieb erhöht zudem die Prozesssicherheit und die Ausbeute.

Plattformübergreifend, hinsichtlich der 200 mm und 300 mm Coater/Developer Cluster, wurden weitere Themen zur Erhöhung der Prozesssicherheit und Stabilität umgesetzt. Die Entwicklungen eines geschlossenen Regelkreises zur Dispense Arm Positionierung ermöglicht eine hohe Zuverlässigkeit bei der Entlackung des Randbereiches eines Substrates. Die betroffene Fläche kann auf ein Minimalmaß reduziert werden und somit die aktiv nutzbare Fläche, gleichbedeutend mit Ausbeute, erhöht werden. In einem weiteren Projekt wurde die Ausführung der temperierten Medienversorgung der Entwicklermodule überarbeitet. So ist nun eine geringere Toleranz sowie ein erweiterter einstellbarer Bereich der Temperatur möglich. Dies

bietet Verbesserungen sowohl hinsichtlich der Prozesszeiten, als auch der Prozesssicherheit. Die neuen Module ermöglichen zudem eine flexible Anordnung der Temperiertechnik, auch weit entfernt zu den Prozessanlagen.

Die Fähigkeit der 300 mm Maschinen wurde dahingehend erweitert, bei nur geringfügig gestiegenen Kosten Substrate zu prozessieren, die eine über das Standardmaß hinausgehende Fläche bieten. Hierfür wurden alle Module, vom Spincoater, über die Hot- und Coolplates bis hin zu dem Entwickler konstruktiv überarbeitet.

In der Produktlinie Mask Aligner wurde die Steuerungsplattform durch eine Soft- und Hardwareüberarbeitung zur Modernisierung der Bedienungskonzepte weiter entwickelt. Im Jahr 2013 wurden bereits die ersten Ergebnisse der Überarbeitung in neuen Maschinen umgesetzt. Die Weiterentwicklung, welche grundsätzlich auf alle Mask Aligner-Typen zielt, wurde im letzten Jahr zuerst bei der MA200Compact eingesetzt.

Die Ingenieure von SÜSS MicroTec arbeiten permanent an einer Verbesserung der Prozessfähigkeit der Maschinen. Ein wichtiger Entwicklungsschritt hierbei ist die Neu- und Weiterentwicklung der Werkzeuge (Toolings), zum Beispiel für die Verarbeitung ungewöhnlicher Substrate vor allem im MEMS-Bereich. Diese Neuerungen verbessern die Vermarktungsmöglichkeiten in einem durch die Vielseitigkeit der Prozesse und Substrate gekennzeichnetem Technologiebereich. Bei den Produktionsalignern MA200 Compact, MA300, MA150e wurde die Automatisierung sowie die Einbettung in Fab-Automatisierungssysteme weiterentwickelt. Damit trägt SÜSS MicroTec den steigenden Anforderungen hinsichtlich Automatisierung und Wafertracking in den Hochvolumenmärkten Rechnung.

SÜSS MicroTec Photonic Systems entwickelt und fertigt UV-Projektionsscanner sowie Excimer-Laser-Stepper. Diese Maschinen sind hochkomplex und die Entwicklung neuer Maschinengenerationen erstreckt sich über einen vergleichsweise langen Zeitraum. Im Geschäftsjahr 2013 wurden sowohl die Projektionsscanner als auch die Excimer-Laser-Stepper weiter entwickelt und die jeweils neue Maschinengeneration wird im Verlauf des ersten Halbjahres 2014 in den Markt eingeführt werden. Bei den Neuerungen geht es im Wesentlichen darum, die Anforderungen moderner Packaging-Technologien in der Volumenproduktion zu adressieren.

SUBSTRAT BONDER

Das Segment Substrat Bonder konnte im Geschäftsjahr 2013 einen Folgeauftrag für die neueste Generation von Produktions-Bondclustern verbuchen. Der Kunde, der bereits 2012 erste Geräte von SÜSS MicroTec installiert hat, plant mit den neu bestellten Systemen in die Vorserienproduktion einzusteigen. Für diese Maschinen wurden zahlreiche Neu- und Weiterentwicklungen durchgeführt, dazu gehört unter anderem die kontinuierliche und konsequente Verbesserung der Hardware und Software für die Anforderungen in der Massenproduktion. Die Fähigkeit, Anlagen in die Fab-Automation auf Kundenseite einbinden zu können ist für die Volumenfertigung unablässig. Daneben wurde an der Verbesserung des Durchsatzes und der vollautomatischen Beladung für Wafer und Tapeframe Loadports gearbeitet.

In Zusammenarbeit mit einem externen Partner wurde der Prototyp eines kostengünstigen Excimer-Laser-Debonders entwickelt. Der Excimer-Laser-Debonder wird für die Entwicklung von neuartigen, temporären Bondprozessen für Interposer- und 3D Anwendungen eingesetzt. Die Prozessentwicklung fand in Kooperation mit verschiedenen Materialherstellern statt. Im Geschäftsjahr 2013 wurde darüber hinaus ein neuartiger Bonder für Fusions- und Hybrid-Bondprozesse auf Basis der XBS300 Gen2 Plattform fertig gestellt und im Rahmen eines gemeinsamen Entwicklungsprogrammes bei einem führenden europäischen Forschungsinstitut installiert.

FOTOMASKEN EQUIPMENT

Immer kleinere Strukturen und eine immer höhere Integrationsdichte verlangen stets die Erweiterung bestehender als auch die Entwicklung neuer Lithografie-Technologien im Halbleiter-Frontend. Die 193nm Immersionslithografie, basierend auf der Verwendung optischer Transmissionsmasken sowie die EUV-Lithografie, die hochempfindliche reflektierende Masken verwendet, sind dabei die beiden Technologien, die die Entwicklungen im Markt vorantreiben. Infolgedessen müssen auch die damit unmittelbar verknüpften Verfahrenstechniken wie die Fotomaskenreinigung, eine der Kernkompetenzen von SÜSS MicroTec, angepasst werden.

Im Jahr 2013 lag ein wesentlicher Focus auf der Evaluierung von Methoden zur Verbesserung der Sauberkeit der Rückseite von EUV Masken während des Fotomaskenreinigungsprozesses. Neben der Optimierung der Reinigungsapplikation an sich, wurde der Einsatz von verschiedenen Materialien und Geometrien für den Fotomaskensubstrathalter (Chuck) in der Reinigungskammer untersucht. Während bei dem vorherigen Chuck kleinste Partikel herausgelöst wurden und sich teilweise auf der Fotomaskenrückseite abgesetzt hatten, konnte mit einer neuartigen Chuck-Variante die intrinsische Reinheit auf ein Maximum angehoben werden. Hinzu kam, dass durch die Materialauswahl der Chuck wesentlich filigraner und mit reduzierten Störkanten geformt werden konnte, wodurch wiederum die Effizienz der Rückseitenspülung während der Reinigung gesteigert wird.

Das im Jahre 2012 in das MaskTrack Pro InSync System integrierte Rückseiteninspektionsgerät, wodurch ein weiterer wesentlicher Schritt zur Unterstützung der gesamten EUVL-Infrastruktur und -logistik geschaffen wurde, wird mit einer von SÜSS MicroTec eigens entwickelten Software unterstützt. Diese erlaubt die Bewertung der ermittelten Defektdaten und automatisiert eine ggf. notwendige weitere Reinigung des Substrates. Im vergangenen Jahr wurde im Rahmen eines Projektes mit einem großen Chiphersteller diese Defektdatenanalyse (SW) weiter ausgebaut, die eine detaillierte Klassifizierung der Daten aufgrund ihrer Größe und Art zulässt.

Nach der Einführung eines neuen Reinigungsmediums konnte im Jahr 2013 der Reinigungsprozess dahingehend qualifiziert werden, dass eine Reinigung von Fotomasken für die optische Lithografie (193i) für einen Technologieknoten < 16nm möglich ist. Hierdurch wird eine weitere Reduzierung der Beeinträchtigung der optischen Eigenschaften und der Beschädigung der Strukturen auf den Masken erzielt. Mit diesen Entwicklungen stellt SÜSS MicroTec die entsprechenden Weichen, um auch weiterhin seine Marktvorherrschaft zu behaupten und auszubauen sowie Komplettlösungen für die EUV Lithografie und 193i Technologie anzubieten.

F&E Ausgaben im Jahresvergleich in Mio. €

	2013	2012
F&E Aufwand	10,2	9,7
F&E Abschreibung	2,3	2,5
F&E Aktivierung	0,1	0,1
F&E Netto-Aktivierung	-2,2	-2,4
F&E Nettoinvestitionen + Aufwand	8,0	7,3

Chart F&E Mitarbeiter 2012: 134 2013: 127

ÜBERBLICK ÜBER DEN GESCHÄFTSVERLAUF

GESAMTWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Den Aussagen des ifo Instituts zufolge ist die deutsche Wirtschaft hoffnungsfroh ins neue Jahr gestartet. Das ifo Geschäftsklima für die gewerbliche Wirtschaft Deutschlands hatte sich im Januar 2014 zum dritten Mal in Folge verbessert. Die wirtschaftliche Situation in den Industrieländern wird zwar weiterhin durch die Folgen der Finanzkrise belastet, aber auch hier stehen die Zeichen auf Erholung. Insgesamt hat sich die seit Mitte 2013 anziehende Konjunktur in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften positiv auf das Weltwirtschaftsklima ausgewirkt. Für das Gesamtjahr 2013 prognostiziert der International Monetary Fund in seinem World Economic Outlook ein Weltwirtschaftswachstum um 3,0 %, für 2014 geht man von einem beschleunigten Wachstum um 3,7 % aus.

BRANCHENSPEZIFISCHE RAHMENBEDINGUNGEN

Der gesamte Halbleitermarkt ist im Geschäftsjahr um 4,8 % gewachsen. Das Gesamtvolumen wuchs von 291,6 Mrd. USD im Jahr 2012 auf rund 305,6 Mrd. USD im letzten Jahr (Quelle: Semiconductor Industry Association). Getragen wurde das Wachstum durch eine starke Nachfrage nach DRAM und NAND Speicherbausteinen für die Segmente Smartphones und Tablet Computer.

Der Markt für Halbleiter Equipment wies dagegen erneut einen Rückgang aus. Im Jahr 2013 ist laut Gartner die Nachfrage nach Halbleiter Equipment insgesamt um rund 8,5 % gegenüber Vorjahr gesunken (2012: minus 16,1%). Die Equipment Branche verzeichnet seit fast drei Jahren ein zögerliches Investitionsverhalten der Kunden, die Fertigungskapazitäten werden zum letztmöglichen Zeitpunkt erweitert und große Neuinvestitionen finden nur vereinzelt statt.

UNTERNEHMENSENTWICKLUNG

Im Prognosebericht des Geschäftsberichts 2012 hat das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz von rund 150 Mio. € sowie ein Ergebnis (EBIT) im niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich in Aussicht gestellt. SÜSS MicroTec hat das Geschäftsjahr 2013 mit einem Umsatz in Höhe von 134,5 Mio. € abgeschlossen. Der Grund für die Abweichung im Umsatz sind Verschiebungen der Endabnahme von einzelnen größeren Aufträgen, bei denen die Maschinen bereits zum Kunden ausgeliefert wurden, die finale Abnahme und somit Umsatzlegung jedoch erst im Geschäftsjahr 2014 stattgefunden hat bzw. stattfinden wird. Aufgrund des geringeren Umsatzvolumens, eines ungünstigen Produktmix im Hinblick auf 200 mm und 300 mm Systeme und unter Berücksichtigung der Sonderaufwendungen für den Bereich Permanentes Bonding in Höhe von 13,2 Mio. € hat das Unternehmen ein EBIT von minus 19,4 Mio. € erwirtschaftet (Vorjahr 11,7 Mio. €).

Der Auftragseingang ist im Jahresvergleich um 14,1 % auf 135,0 Mio. € gesunken (Vorjahr: 157,2 Mio. €).

Die liquiden Mittel und verzinslichen Wertpapiere beliefen sich zum Ende des Geschäftsjahres 2013 auf 47,1 Mio. €. Die Nettoliquidität hat sich zum Jahresende 2013 auf 35,7 Mio. € (Vorjahr: 32,3 Mio. €) erhöht, obwohl im letzten Jahr 8,9 Mio. € in den Erwerb der Immobilie am Standort Garching investiert wurden. Der freie Cashflow für das Gesamtjahr belief sich vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben und -verkäufen sowie Sondereffekten aus den getätigten M&A-Aktivitäten auf 4,1 Mio. € (Vorjahr: minus 4,5 Mio. €).

Der Auftragsbestand betrug zum Stichtag 85,7 Mio. € und lag nur leicht unter dem Vorjahresniveau von 86,5 Mio. €.

Das Verhältnis von neu eingegangenen Aufträgen zu realisierten Umsätzen (Book-to-Bill-Ratio) belief sich 2013 auf 1,0 nach 0,96 im Vorjahr.

UMSÄTZE UND AUFTRAGSLAGE IN DEN REGIONEN

Europa, Nordamerika und Asien sind die für das Geschäft von SÜSS MicroTec wichtigen Weltregionen. Dabei unterteilen wir Asien jedoch in Japan und „Sonstiges Asien“, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass unsere Kunden im Markt Advanced Packaging vornehmlich außerhalb Japans – insbesondere in Taiwan – ansässig sind. Dieser Markt ist allerdings auch schwankungsanfälliger als jener für Verbindungshalbleiter und MEMS.

Auftragseingänge nach Regionen

Der Markt für Halbleiter-Equipment ist im Jahr 2013 um rund 8,5 % geschrumpft, dies spiegelt sich auch bei SÜSS MicroTec in rückläufigen Umsatz- und Auftragseingangszahlen wieder. Die Auftragseingänge haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 14,1 % verringert.

Europa ist die einzige Region, die steigende Auftragseingänge verbuchen konnte. Die Region erreichte mit einem Auftragseingang von 41,9 Mio. € (Vorjahr: 36,0 Mio. €) ein Plus gegenüber Vorjahr von rund 16%. Aufgrund von weniger Aufträgen aus den Produktlinien Fotomasken Equipment und Mask Aligner verzeichnete die Region Nordamerika einen Rückgang um 36,4 % im Auftragseingang und erreichte im Gesamtjahr 2013 Aufträge in Höhe 18,9 Mio. € (Vorjahr: 29,7 Mio. €). Die Region Japan verzeichnete im Jahr 2013 einen

Auftragseingang von 6,6 Mio. €, was ein Minus von 47,2 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. In dieser Region wurden im Vergleich zum Vorjahr vor allem weniger Aufträge aus dem Segment Substrat Bonder verbucht.

In der wichtigsten Region Sonstiges Asien (ohne Japan) verzeichnete die SÜSS MicroTec-Gruppe ein Auftragsminus in Höhe von 13,9 % auf 67,6 Mio. € (Vorjahr: 78,5 Mio. €).

Auftragseingänge nach Regionen in Mio. €

	2013	2012
Europa	41,9	36,0
Nordamerika	18,9	29,7
Japan	6,6	12,5
Sonstiges Asien	67,6	78,5
Rest der Welt	0,0	0,5

Umsätze nach Regionen

Alle Regionen, mit Ausnahme der Region Europa, mussten im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang im Umsatz hinnehmen. In Europa erhöhte sich der Umsatz um rund 2 % auf 41,2 Mio. € nach 40,5 Mio. € im Vorjahr. Die Region Nordamerika verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang um 25,4 % auf 22,6 Mio. € (Vorjahr: 30,3 Mio. €). Auch Japan erwirtschaftete mit 5,2 Mio. € einen deutlich niedrigeren Wert als im Vorjahr (16,5 Mio. €). Die Region Sonstiges Asien verzeichnete einen Umsatzrückgang um 14,4 % auf 65,5 Mio. € (Vorjahr: 76,5 Mio. €).

Umsätze nach Regionen in Mio. €

	2013	2012
Europa	41,2	40,5
Nordamerika	22,6	30,3
Japan	5,2	16,5
Sonstiges Asien	65,5	76,5

GESCHÄFTSENTWICKLUNG IN DEN EINZELNEN SEGMENTEN

Lithografie

Das Segment Lithografie umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Produktlinien Mask Aligner, Projektionsscanner, Laser Processing Tools sowie Developer und Coater. Die Fertigung dieser Produktlinien ist in Deutschland an den Standorten Garching bei München und seit Anfang 2010 in Sternenfels angesiedelt. Die Lithografiesparte wurde im ersten Quartal 2012 mit der Akquisition der Tamarack Scientific Co., Inc. (firmiert heute unter SUSS MicroTec Photonic Systems Inc.) verstärkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Corona, Südkalifornien, USA. Das Segment Lithografie ist mit einem Umsatzanteil von 66 % der größte Bereich der SÜSS MicroTec-Gruppe. Die Komponenten, die auf diesen Maschinen gefertigt werden, gehen im Wesentlichen in die Endmärkte Advanced Packaging, Mikrosystemtechnik und Verbindungshalbleiter (LED) sowie 3D-Integration.

Im Geschäftsjahr 2013 erzielte das Segment Lithografie einen Auftragseingang von 87,9 Mio. € sowie einen Umsatz von 88,3 Mio. €. Dies entspricht einem Rückgang im Auftragseingang um rund 8 % bzw. einem Minus im Umsatz um 22 % gegenüber Vorjahr. Obwohl viele unserer asiatischen Kunden mit hohen Auslastungsgraden im Bereich um 90 % arbeiten, werden Investitionen zur Kapazitätsausweitung weiterhin nur sehr zögerlich ausgeführt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es nur wenige nennenswerte Investitionen in 300mm Geräte, welche für SÜSS MicroTec typischer Weise eine sehr gute Bruttomarge ausweisen. Das verringerte Segmentergebnis (EBIT) ist dem ungünstigen Produktmix im Hinblick auf 200mm und 300mm Geräte, der Belastung durch den negativen Ergebnisbeitrag von SUSS MicroTec Photonic Systems sowie dem insgesamt gesunkenen Umsatz geschuldet. Das EBIT fiel von 23,7 Mio. € im Vorjahr auf 3,2 Mio. € im abgelaufenen Geschäftsjahr, dies ist ein Rückgang um 87 %. Die Bruttomarge hat sich gegenüber Vorjahr deutlich verringert und lag 2013 bei 27,2 % (Vorjahr: 40,7 %).

Segmentübersicht Lithografie (in Mio. €)

	2013	2012
Auftragseingang	87,9	95,6
Segmentumsatz	88,3	113,2
Segmentergebnis	3,2	23,7
Nettovermögen	44,3	49,9

Substrat Bonder

Das Segment Substrat Bonder umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Substrat (Wafer) Bonder. Die Fertigung ist an unserem größten Standort in Sternenfels angesiedelt. Zu den adressierten Märkten der Substrat Bonder zählen die Mikrosystemtechnik, die Verbindungshalbleiter sowie die 3D-Integration.

Das Segment Substrat Bonder entwickelte sich sowohl im Auftragseingang mit 24,3 Mio. € (Vorjahr: 27,4 Mio. €) als auch im Umsatz mit 22,9 Mio. € (Vorjahr: 23,1 Mio. €) verhalten. Das Segmentergebnis (EBIT) fiel aufgrund der Sonderbelastungen der Restrukturierung im Bereich permanentes Bonden in Höhe von 13,2 Mio. € von minus 12,0 Mio. € im Jahr 2012 auf minus 21,7 Mio. €. Die Bruttomarge verschlechterte sich von minus 10,1 % auf minus 53,5 %.

Aufgrund der Neubewertung der Geschäftssituation im Bereich Permanentes Bonding und der weiterhin unbefriedigenden Ertragslage in dieser Produktlinie, wurden die im zweiten Quartal des Jahres 2013 eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen erweitert und die Produktion von Permanenten Bond Cluster Systemen eingestellt. Die am Markt erfolgreichen manuellen Permanent Bonding Systeme sind von dieser Maßnahme nicht betroffen. Die Restrukturierungsmaßnahmen haben im Gesamtjahr 2013 Sonderaufwendungen in Höhe von insgesamt 13,2 Mio. € nach sich gezogen. Die Sonderaufwendungen beinhalten 9,3 Mio. € aus der Abwertung von Vorräten (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse sowie Demoequipment) sowie 2,7 Mio. EUR aus vorsorglich gebildeten Rückstellungen für einzelne Kundenprojekte und 1,2 Mio. € nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen, die im Wesentlichen auf aktivierte Entwicklungsleistungen aus den Jahren bis 2008 entfallen. Mit Vollzug dieser Maßnahme erwartet das Management von SÜSS MicroTec in Zukunft eine deutliche Reduzierung der Verluste im Segment Substrat Bonder.

Segmentübersicht Substrat Bonder (in Mio. €)

	2013	2012
Auftragseingang	24,3	27,4
Segmentumsatz	22,9	23,1
Segmentergebnis	-21,7	-12,0
Nettovermögen	8,7	34,9

Fotomasken Equipment

Das Segment Fotomasken Equipment umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Maschinen, die auf die Reinigung und Prozessierung von Fotomasken für die Halbleiterindustrie spezialisiert sind und ist am Standort Sternenfels bei Stuttgart angesiedelt. Zu den adressierten Märkten des Segments Fotomasken Equipment zählt die Halbleiterindustrie, hier ist SÜSS MicroTec im Frontend tätig.

Auch das Segment Fotomasken Equipment entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr im Auftragseingang und Umsatz verhalten. Der Auftragseingang lag Ende Dezember 2013 bei 17,5 Mio. € (Vorjahr: 30,2 Mio. €). Der Segmentumsatz belief sich auf 18,4 Mio. € nach 22,9 Mio. € im Jahr 2012. Das Segmentergebnis (EBIT) hat sich verbessert und weist im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Wert von 1,6 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €) aus. Die Bruttomarge lag nach 27,6 % im Vorjahr bei 33,3 %.

Segmentübersicht Fotomasken Equipment (in Mio. €)

	2013	2012
Auftragseingang	17,5	30,2
Segmentumsatz	18,4	22,9
Segmentergebnis	1,6	1,1
Nettovermögen	3,6	8,9

Sonstige

Das Segment Sonstige umfasst die Mikrooptik-Aktivitäten am Standort Hauterive, Schweiz, und das Geschäftsfeld C4NP sowie die größtenteils auf Segmentebene nicht zurechenbaren Kosten der zentralen Konzernfunktionen. Der Anteil an dem Mikrooptik-Geschäft wurde im ersten Halbjahr 2012 von 85 % auf 100 % aufgestockt. Damit soll das Unternehmen SUSS MicroOptics, welches wichtige Schlüsseltechnologien beherrscht, noch enger an SÜSS MicroTec gebunden werden.

Der Auftragseingang steigerte sich von 4,0 Mio. € im Geschäftsjahr 2012 auf 5,3 Mio. € im Jahr 2013. Der Segmentumsatz belief sich auf 4,9 Mio. € nach 4,6 Mio. € im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Hierbei verzeichnete das Geschäftsfeld Mikrooptik im Auftragseingang einen deutlichen Zuwachs von 3,9 Mio. € auf 5,2 Mio. € sowie einen stabilen Umsatz in Höhe von 4,6 Mio. €. Für das Geschäftsjahr 2013 belief sich das Segmentergebnis auf minus 2,4 Mio. € nach minus 1,0 Mio. € im Vorjahr.

Segmentübersicht Sonstige (in Mio. €)

	2013	2012
Auftragseingang	5,3	4,0
Segmentumsatz	4,9	4,6
Segmentergebnis	-2,4	-1,0
Nettovermögen	18,5	7,7

Mitarbeiter nach Segmenten

	2013	2012
Lithografie	404	419
Substrat Bonder	99	134
Fotomasken Equipment	100	106
Sonstige	52	45

NICHTFINANZIELLE LEISTUNGSINDIKATOREN

SÜSS MicroTec verfügt über mehr als sechzig Jahre Erfahrung in der Fertigung von Anlagen und Entwicklung von Prozesslösungen für Mikrostrukturanwendungen. Das Unternehmen hat für die Halbleiterindustrie Standards in Präzision und Qualität gesetzt. Kontinuierliche Innovationsleistungen und die Fähigkeit, stets neue Lösungen in einem sich schnell ändernden Umfeld bereit zu stellen, haben SÜSS MicroTec zum Technologieführer gemacht.

Qualitätsmanagement

Die technologisch führende Position von SÜSS MicroTec in den Bereichen Lithografie, Fotomasken Equipment, Substrat Bonder und Mikrooptik fußt auf der starken Verpflichtung zur Einhaltung höchster Qualitätsstandards. Unsere Qualitätsziele basieren auf nachhaltigem Kundenvertrauen, Wertschätzung gegenüber unseren Kunden, Partnerschaften und motivierten Mitarbeitern. SÜSS MicroTec liefert qualitativ hochwertige Produkte und Services sowie innovative Lösungen.

Alle Bereiche von SÜSS MicroTec teilen unsere Verpflichtung zu höchster Qualität. Unsere Prozesse basieren auf einem effektiven Qualitätsmanagement-System, das für die Produktionsstandorte in Deutschland und der Schweiz unter ISO 9001 zertifiziert ist und ständig verbessert wird.

Umweltverantwortung und Nachhaltigkeit

Das Thema Nachhaltigkeit genießt bei uns eine sehr hohe Priorität. Als Technologieführer und Innovationstreiber fühlt sich das Unternehmen nicht nur der Erstklassigkeit der Produkte, sondern auch dem Thema Nachhaltigkeit verpflichtet. Es geht bei den Managemententscheidungen immer auch darum, die sozialen, ökologischen und ökonomischen Komponenten in Einklang zu bringen. Ob mit Kunden, Mitarbeitern oder Wettbewerbern, wir streben allzeit nach einem fairen und sozial verträglichen Umgang miteinander. Darüber hinaus legt SÜSS MicroTec die gleichen hohen Maßstäbe an die Zulieferer und Geschäftspartner.

In den vergangenen Jahren hat SÜSS MicroTec am Produktionsstandort Garching verschiedene energieeffiziente Maßnahmen, wie beispielsweise die Optimierung der Pumpensysteme in der Heizungs- u. Klimatechnik, den Einsatz von Druckluftkompressoren mit Wärmerückgewinnung, neue Beleuchtungskonzepte sowie generell einen energiebewussteren Umgang mit Energie eingeführt. Mit diesen Maßnahmen konnte der Stromverbrauch seit 2008 um mehr als 15% gesenkt werden.

Aufgrund altersbedingter Funktionsdefizite wurden im Geschäftsjahr 2013 die Kälteaggregate am Standort Garching in mehreren Bauabschnitten in den Reinräumen erneuert. Die zwei neuen Kälteaggregate, die mit einer „Freien Kühlung“ ausgestattet sind, können Energieeinsparungen bei Außentemperaturen unter 11°C bewirken. Erfahrungsgemäß geht man davon aus, dass sich bei diesen Temperaturen (an ca. 90 Tagen/ Jahr) der Kühlbedarf um ca. 30% reduziert, d. h. die Kompressoren der Kältemaschinen werden dadurch entlastet und die Energiekosten gesenkt. Die neuen Kältemaschinen wurden in einem Kälteverbund so installiert, dass jetzt eine redundante Kälteherstellung gegeben ist, d. h. im Störfall (z. B. Ausfall einer Kältemaschine, Wartungsarbeiten) wird die Produktion deshalb nicht beeinträchtigt. Mit diesen Umbauarbeiten hat das Unternehmen die Produktionssicherheit am Standort Garching erhöht und gleichzeitig eine weitere energieeffiziente Maßnahme durchgeführt

SÜSS MicroTec ist weiterhin Partner der Nachhaltigkeitsinitiative Blue Competence des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) und bekennt sich zu nachhaltigem und verantwortungsbewusstem Handeln. Zudem fühlt sich das Unternehmen dem Verhaltenskodex der Electronic Industry Citizenship Coalition® (EICC®) verpflichtet und hat die für die ISO 14001-Zertifizierung notwendigen Teile umgesetzt. Der EICC® setzt Normen fest, die sichere Arbeitsbedingungen in der Beschaffungskette der Elektronikindustrie, eine respekt- und würdevolle Behandlung der Arbeitskräfte sowie umweltgerechte und ethisch vertretbare Geschäftsprozesse gewährleisten sollen.

Mitarbeiter

Die Sicherheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter liegen uns ganz besonders am Herzen. Ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld fördert sowohl die Produktivität als auch das Arbeitsklima im Unternehmen. Wie in unserer Erklärung zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit dargelegt, (www.suss.com > Unternehmen > Qualitätsmanagement) gibt es spezielle Programme, um die höchsten Standards im Hinblick auf Sicherheit zu erfüllen. Wir führen an unseren Produktionsstandorten detaillierte Statistiken über Arbeitsunfälle und werten diese regelmäßig aus. In regelmäßigen Abständen bieten wir darüber hinaus betriebsärztliche Termine z. B. zu kostenlosen Sehtests oder Schutzimpfungen an.

Die Zusammenarbeit unserer Mitarbeiter weltweit sowie unser Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern ist geprägt von gegenseitigem Respekt, integrem Handeln und der Einhaltung ethischer Richtlinien und Gesetze. Um die zahlreichen rechtlichen und ethischen Herausforderungen bei der täglichen Arbeit zu bewältigen, Orientierung zu schaffen und so das Vertrauen in die Leistung und Integrität der SÜSS MicroTec-Gruppe zu stärken, haben wir einen Verhaltenskodex („Code of Conduct“) verabschiedet, dessen Einhaltung für alle Mitarbeiter weltweit verbindlich ist.

Kundenbeziehungen

Im Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern legen wir großen Wert auf die Einhaltung hoher ethischer Standards. Wir sind der Meinung, dass dies entscheidend zum Unternehmenserfolg beitragen kann. Dazu gehört der korrekte Umgang mit insidierrelevanten Informationen, mit dem geistigen Eigentum der Mitarbeiter und vertraulichen Informationen von Kunden und Lieferanten.

Zu unseren Kunden zählen unter anderem namhafte Integrated Device Manufacturers (IDM) in aller Welt und zahlreiche Kunden im Bereich Outsourced Assembly and Test Houses (OSAT). Darüber hinaus arbeiten wir seit vielen Jahren mit führenden Universitäten und Forschungsinstituten im In- und Ausland sehr erfolgreich zusammen. Im Rahmen der Entwicklung von neuen und innovativen Technologien, Maschinen und Lösungen, gehen wir zudem Partnerschaften und Kooperationen mit anderen Industrieunternehmen ein.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

ERTRAGSLAGE

Die Ertragslage des SÜSS MicroTec Konzerns zeigt im Geschäftsjahr 2013 einen deutlichen Umsatzrückgang und ein negatives Jahresergebnis. Die Umsätze sanken im Vergleich zum Vorjahr um rund 18 % und beliefen sich auf 134,5 Mio. €, während im Vorjahr noch Umsätze von 163,8 Mio. € erzielt wurden. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) aus fortgeführten Aktivitäten belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf minus 19,4 Mio. €. In 2012 wurde ein positives EBIT von 11,7 Mio. € erreicht.

Im EBIT des Geschäftsjahres 2013 sind Sonderaufwendungen in Höhe von 13,2 Mio. € enthalten, die im Zusammenhang mit der Einstellung der Produktion von Permanent Bond Cluster Systemen angefallen sind¹. Dabei handelt es sich um Wertminderungen auf Lagerbestände (9,3 Mio. €), außerplanmäßige Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten (1,2 Mio. €), Wertberichtigungen auf Kundenforderungen (0,5 Mio. €) und Bildung von Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen (2,2 Mio. €). Ohne diese Sonderaufwendungen würde das EBIT 2013 rund minus 6,2 Mio. € betragen.

Der Rückgang der Umsatzerlöse resultiert im Wesentlichen aus geringeren Umsätzen im Segment Lithografie. Während im Vorjahr noch Lithografie-Umsätze von 113,2 Mio. € erzielt werden konnten, beliefen sich die Umsätze im abgelaufenen Geschäftsjahr nur auf 88,3 Mio. €. Der Rückgang betraf sowohl die Produktlinie Mask Aligner als auch die Produktlinie Coater. Das in 2012 neu hinzugekommene Geschäft von SÜSS MicroTec Photonic Systems (vormals: Tamarack Scientific) mit den Produktlinien UV-Projektionsbelichtung und Laser-Prozessierung trug mit Umsätzen von 11,6 Mio. € zum Konzernumsatz bei. In 2012 (seit dem Akquisitionszeitpunkt 29. März 2012) wurden mit den Photonic-Systems-Produktlinien lediglich Umsätze von 1,9 Mio. € erzielt. Die Umsätze im Segment Substrat Bonder bewegten sich mit 22,9 Mio. € in etwa auf Vorjahresniveau (Umsatz 2012: 23,1 Mio. €). Im Segment Fotomasken Equipment wurden mit 18,4 Mio. € rund 20 % geringere Umsätze erzielt als im Vorjahr. Die Umsätze im Bereich Mikrooptik erhöhten sich leicht von 4,3 Mio. € im Vorjahr auf nun 4,6 Mio. €.

In den Umsatzkosten sind Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten in Höhe von 2,3 Mio. € enthalten. Davon betreffen 1,2 Mio. € außerplanmäßige Abschreibungen auf Entwicklungsleistungen, die in der Vergangenheit im

¹ siehe Ad-Hoc-Mitteilung der SÜSS MicroTec AG vom 6. November 2013

Zusammenhang mit dem Bereich Permanent Bond Cluster aktiviert wurden. Die Neu-Aktivierungen beliefen sich auf knapp 0,1 Mio. €. Im Vorjahr wurden Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten von 2,5 Mio. € erfasst, während sich die Neu-Aktivierungen ebenfalls auf 0,1 Mio. € summierten.

Im Geschäftsjahr 2013 wurde ein Rohertrag von 21,8 Mio. € erzielt, was einer Rohertragsmarge von 16,2 % entspricht. Im Vorjahr betrug der Rohertrag 57,4 Mio. €; die Rohertragsmarge 2012 belief sich auf 35,0 %. Der Rohertrag des Geschäftsjahres 2013 ist belastet mit Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung des Permanent Bond Cluster Bereichs. Von den gesamten Sonderaufwendungen in Höhe von 13,2 Mio. € sind 10,5 Mio. € in den Umsatzkosten erfasst. Darüber hinaus enthalten die Umsatzkosten außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 1,9 Mio. € auf Maschinen im Vorratsbestand der SUSS MicroTec Photonic Systems, die im Rahmen der Purchase Price Allocation im Vorjahr neu bewertet wurden.

Der Rohertrag im Segment Lithografie war im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich geringer als noch im Vorjahr. Die Rohertragsmarge war belastet durch das negative Rohergebnis der Photonic-Systems-Produktlinien, die mit Umsätzen von 11,6 Mio. € einen substantiellen Umsatzbeitrag geleistet haben. Darüber hinaus hat das geringe Umsatzvolumen der Produktlinien Mask Aligner und Coater sowie der ungünstige Produktmix die Rohertragsmarge negativ beeinflusst.

Das Rohergebnis des Segments Substrat Bonder war erneut negativ. Neben den erfassten Sonderaufwendungen von 13,2 Mio. € ist das Rohergebnis auch belastet durch die unterjährig angefallenen negativen Margen der Permanent Bond Cluster Systeme. Die Umsätze im Bereich Temporary Bonding und De-Bonding erzielten – aufgrund der noch geringen Stückzahlen – nur niedrige Margen.

Erfreulich hat sich die Rohertragsmarge des Segments Fotomasken Equipment entwickelt. Aufgrund einiger margenstarker Aufträge lag die Rohertragsmarge deutlich über der im Vorjahr erzielten Marge.

Die Vertriebskosten des Geschäftsjahres verringerten sich von 20,7 Mio. € im Vorjahr auf 17,5 Mio. €, was – in Relation zum erzielten Umsatz – einer Aufwandsquote von 13,0 % (Vorjahr: 12,6 %) entspricht.

Die Verwaltungskosten reduzierten sich von 17,0 Mio. € im Vorjahr auf nun 15,0 Mio. € und entsprechen damit einer Aufwandsquote von 11,1 % (Vorjahr: 10,4 %).

Die Forschungs- und Entwicklungskosten erhöhten sich von 9,7 Mio. € im Vorjahr auf 10,2 Mio. €. Sie betrafen mit 5,4 Mio. € das Segment Lithografie und mit 3,0 Mio. € das Segment Substrat Bonder. 1,4 Mio. € waren dem Segment Fotomasken Equipment zuzuordnen. In den Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen des Segments Substrat Bonder sind im abgelaufenen Geschäftsjahr 1,2 Mio. € Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung des Permanent Bond Cluster Bereichs erfasst.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betrugen im Geschäftsjahr 5,5 Mio. € (Vorjahr: 6,1 Mio. €) und beinhalten vor allem Erträge aus Fremdwährungsumrechnungen. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Reduzierung der Earn-Out-Verpflichtung Photonic Systems (vormals: Tamarack Scientific) in Höhe von 2,1 Mio. € enthalten. Die Auflösung der entsprechenden Verbindlichkeit resultiert aus einer Neubeurteilung der voraussichtlichen Ertragslage von SUSS MicroTec Photonic Systems, auf deren Basis der Earn-Out für die Verkäufer und die Mitarbeiter von Photonic Systems ermittelt wird. Auch im Vorjahr wurden hier Erträge aus einer Anpassung der Earn-Out-Verpflichtung in Höhe von 2,1 Mio. € erfasst.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich in 2013 auf 4,1 Mio. € (Vorjahr: 4,4 Mio. €) und beinhalten vor allem Aufwendungen aus Fremdwährungsumrechnungen sowie Aufwendungen für die Bildung von Wertberichtigungen auf Kundenforderungen. In den Wertberichtigungen auf Kundenforderungen sind 0,5 Mio. € enthalten, die ein Kundenprojekt des Bereichs Permanent Bond Cluster betreffen und daher im Rahmen der Restrukturierung dieses Bereichs wertberichtigt wurden.

Das Segment Lithografie steuerte ein Segmentergebnis in Höhe von 3,2 Mio. € (Vorjahr: 23,7 Mio. €) zum Konzern-EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) bei. Damit ergibt sich für das Segment Lithografie eine Umsatzrendite von 3,6 %, die sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert hat (Umsatzrendite des Vorjahres: 20,9 %). Der Rückgang des Ergebnisses und der Umsatzrendite des Segments Lithografie ist zum einen auf die nun enthaltenen Produktlinien von Photonic Systems (vormals: Tamarack Scientific) zurückzuführen, die einen Umsatzbeitrag von 11,6 Mio. € und ein negatives EBIT von minus 5,1 Mio. € beisteuerten. In diesem EBIT-Betrag sind auch Erträge aus der Auflösung einer Earn-Out-Verbindlichkeit in Höhe von 2,1 Mio. € enthalten. Zum anderen war das EBIT des Segments Lithografie negativ beeinflusst durch ein geringes Umsatzvolumen der Produktlinien Mask Aligner und Coater sowie durch einen ungünstigen, margenschwachen Produktmix.

Im Segment Substrat Bonder ergibt sich ein EBIT von minus 21,7 Mio. € nach minus 12,0 Mio. € im Vorjahr. Das Ergebnis ist belastet mit Sonderaufwendungen in Höhe von 13,2 Mio. €, die im Zusammenhang mit der Einstellung der Produktion von Permanent Bond Cluster Systemen angefallen sind. Zudem liegt die Bruttomarge von Substrat Bondern für temporäres Bonden und De-Bonden nach wie vor im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Das Segment Fotomasken Equipment trug mit einem Ergebnis von 1,6 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €) zum Konzern-EBIT bei. Die Umsatzrendite lag bei 8,4 % und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (Umsatzrendite 2012: 4,8 %) erhöht. Grund für die – trotz eines geringeren Umsatzes – erhöhte Umsatzrendite sind im Wesentlichen einige marginstarke Aufträge, die in 2013 realisiert werden konnten.

Das Finanzergebnis belief sich 2013 auf minus 0,1 Mio. € (nach 11 Tsd. € im Vorjahr).

Das Konzernergebnis ist mit einem Steuerertrag in Höhe von 3,6 Mio. € belegt, was einer durchschnittlichen Steuerquote von rund 18 % entspricht. Grund für die geringe Steuerquote sind im Geschäftsjahr 2013 aufgelaufene Verluste ausländischer Konzerngesellschaften (insbesondere in den USA), für die unter Berücksichtigung der aktuellen Konzernplanung keine aktiven latenten Steuern angesetzt wurden. Im

Vorjahr war das Konzernergebnis mit einem Steueraufwand von 4,1 Mio. € belastet; die durchschnittliche Steuerquote betrug im Vorjahr rund 35 %.

Im Konzern ergab sich ein Verlust nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten von minus 16,0 Mio. €. Dem steht im Vorjahr ein Gewinn von 7,6 Mio. € gegenüber.

Aus nicht fortgeführten Aktivitäten erzielte der Konzern im Vorjahr ein Ergebnis nach Steuern von 1,5 Mio. €, das ausschließlich dem nicht fortgeführten Bereich Test Systeme zuzuschreiben ist. Der erzielte Ertrag resultierte aus einer nachträglichen Kaufpreiszahlung im Zusammenhang mit dem Verkauf des Test-Business, die der SÜSS MicroTec AG im Februar 2012 ausbezahlt wurde.

Insgesamt erzielte der Konzern im Berichtsjahr ein Ergebnis nach Steuern von minus 16,0 Mio. € (Vorjahr: 9,1 Mio. €). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten betrug minus 0,84 € nach 0,48 € im Vorjahr.

Der Umsatz je Mitarbeiter verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 12,0 % von 233 Tsd. € auf 205 Tsd. € (basierend auf der jeweiligen Anzahl der Mitarbeiter zum Bilanzstichtag).

FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

Die Net Cash Position des Konzerns – der Saldo aus flüssigen Mitteln sowie verzinslichen Wertpapieren und Finanzverbindlichkeiten – erhöhte sich von 32,3 Mio. € im Vorjahr auf 35,7 Mio. € zum 31. Dezember 2013. Der Bestand an liquiden Mitteln und verzinslichen Wertpapieren erhöhte sich von 36,6 Mio. € im Vorjahr auf 47,1 Mio. € zum Ende des Berichtsjahres.

Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich auf 16,3 Mio. € (Vorjahr: minus 0,6 Mio. €). Hier machte sich vor allem der deutliche Anstieg des Bestands an erhaltenen Anzahlungen bemerkbar, aus dem ein Mittelzufluss in Höhe von 13,6 Mio. € resultierte. Daneben waren Mittelzuflüsse von 8,2 Mio. € aus dem Rückgang der Kundenforderungen zu verzeichnen. Die Veränderung der Lieferantenverbindlichkeiten sowie der übrigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen haben Mittelabflüsse von 0,9 Mio. € und 2,3 Mio. € nach sich gezogen.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug ohne Berücksichtigung der Investitionen in Wertpapiere minus 12,2 Mio. €. Für den Erwerb der Immobilie am Firmenhauptsitz in Garching flossen liquide Mittel in Höhe von 8,9 Mio. € ab. Neben dem Kaufpreis von 8,6 Mio. € sind hier Erwerbsnebenkosten von 0,3 Mio. € enthalten. Die übrigen Investitionen in Sachanlagen betrafen teilweise die Fertigstellung von Einbauten (insbesondere ein neuer Reinraum) in den neu gemieteten Räumen der SÜSS MicroOptics (Hauterive / Schweiz), für die Mittelabflüsse von rund 1,3 Mio. € zu verzeichnen waren. Darüber hinaus wurden vor allem Neuanschaffungen in technische Anlagen und Maschinen sowie in Betriebs- und Geschäftsausstattung der deutschen Gesellschaften getätigt. Die Investitionen in immaterielle Vermögenswerte betrafen überwiegend Software. Im Vorjahr betrug der Cashflow aus Investitionstätigkeit ohne Berücksichtigung der Investitionen in Wertpapiere und bereinigt um den Erwerb der Tamarack Scientific Co., Inc. (nun: SÜSS MicroTec

Photonic Systems Inc.) sowie ohne Berücksichtigung der nachträglichen Kaufpreiszahlung für das Test Business minus 4,2 Mio. €.

Der freie Cashflow belief sich damit – vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben und –verkäufen – auf 4,1 Mio. €. Im Vorjahr wurde ein freier Cashflow (bereinigt um die Effekte aus Wertpapiererwerben und –verkäufen und bereinigt um die Zahlungsströme aus dem Kauf Tamarack Scientific und dem Verkauf Test) von minus 4,5 Mio. € erzielt.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet einen Zufluss von 7,5 Mio. € aus der Aufnahme eines Bankdarlehens, mit dem der Erwerb der Immobilie Garching gegenfinanziert wurde. Das Darlehen weist einen fixen Zinssatz und eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2021 auf. Es wurde im Dezember 2013 valuiert und zur Auszahlung gebracht. Darüber hinaus zeigt sich im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit – wie im Vorjahr – die planmäßige Tilgung des Immobiliendarlehens Sternenfels. Im Vorjahr waren im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit auch Mittelabflüsse von 0,8 Mio. € enthalten, die die planmäßige Tilgung des Finanzierungsleasings für das konzernweite SAP-System betrafen. Im Dezember des Vorjahres wurde außerdem das Schulscheindarlehen mit 9 Mio. € zur Rückzahlung fällig und komplett aus den vorhandenen liquiden Mitteln getilgt. Darüber hinaus war im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit des Vorjahres der Abfluss von 1,2 Mio. € für den Erwerb von 15 % der Anteile an der SUSS MicroOptics S.A. (Hauterive / Schweiz) erfasst, die bis zum Erwerbszeitpunkt von Minderheitsaktionären gehalten wurden.

Neben liquiden Mitteln und verzinslichen Wertpapieren in Höhe von 47,1 Mio. € (Vorjahr: 36,6 Mio. €) verfügt der Konzern zum Ende des Berichtsjahres über inländische Aval- und Kreditlinien von 8,0 Mio. € (Vorjahr: 11,2 Mio. €). Die Linie wurde im Berichtsjahr ausschließlich in Form von Avalen in Anspruch genommen. Der wesentliche Teil davon entfällt auf Anzahlungsbürgschaften. Zum Bilanzstichtag betrug die Inanspruchnahme 3,3 Mio. €.

Zum 1. April 2013 haben die SÜSS MicroTec AG und die SUSS MicroTec Lithography GmbH mit dem Bankenkonsortium unter Führung der BayernLB neue Kreditverträge unterzeichnet, mit denen eine Kreditlinie von insgesamt 4,5 Mio. € gestellt wird. Dem Bankenkonsortium gehören außerdem die Deutsche Bank sowie die DZ Bank AG an. Die Kreditlinien werden bis auf weiteres gewährt und wurden ohne Covenants gestellt. Sie dienen in erster Linie der Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften.

Zwischen der SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG und der BW Bank Mannheim besteht ein Rahmenkreditvertrag, mit dem eine Kreditlinie in Höhe von 1,0 Mio. € gestellt wird. Die Kreditlinie läuft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne Covenants gestellt. Die SÜSS MicroTec AG hat zur Besicherung der Kreditlinie eine harte Patronatserklärung für die SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG abgegeben.

Bei einer Versicherungsgesellschaft besteht im Zusammenhang mit einem Kautionsversicherungsvertrag ein Bürgschaftsrahmen in Höhe von 2,5 Mio. €. Der Kautionsversicherungsvertrag läuft bis auf weiteres. Zur Sicherung dieser Linie wurde ein Festgeldkonto in Höhe von 0,3 Mio. € an die Versicherungsgesellschaft abgetreten.

Der Konzern verfügt insgesamt über genügend finanziellen Spielraum, notwendige Produktentwicklungen oder andere strategische Aktivitäten zu finanzieren.

Neben dem Geschäfts- oder Firmenwert bestimmen im Wesentlichen die durch Unternehmensakquisition erworbene Technologie der SUSS MicroTec Photonic Systems sowie die Betriebsgrundstücke in Garching und in Sternenfels die langfristigen Vermögenswerte.

Der Geschäfts- oder Firmenwert beträgt 15,3 Mio. € (Vorjahr: 15,4 Mio. €). Ein Teil des Goodwills (2,4 Mio. USD) wird in USD geführt und unterliegt daher Währungsschwankungen. Der gesamte Geschäfts- oder Firmenwert ist ausschließlich dem Segment Lithografie zuzuordnen.

Die aktivierten Entwicklungskosten entwickelten sich im Berichtsjahr rückläufig: Nach 3,0 Mio. € im Vorjahr betrugen sie zum Bilanzstichtag noch 0,8 Mio. €. Neben planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 1,1 Mio. € wurden außerplanmäßige Abschreibungen von 1,2 Mio. € im Zusammenhang mit der Restrukturierung des Permanent Bond Cluster Bereichs vorgenommen. Neuaktivierungen wurden nur noch in Höhe von knapp 0,1 Mio. € vorgenommen. Die zum Bilanzstichtag aktivierten Entwicklungsleistungen entfielen vollständig auf das Segment Lithografie. Im Vorjahr waren neben Entwicklungskosten des Segments Lithografie in Höhe von 1,3 Mio. € weitere Entwicklungskosten in Höhe von 1,7 Mio. € aktiviert, die dem Segment Substrat Bonder zuzuordnen waren.

Darüber hinaus enthalten die langfristigen Vermögenswerte Lizenzen und Patente sowie aktivierte Leasing-Gegenstände (SAP-Lizenzen) in Höhe von 2,3 Mio. € (Vorjahr: 2,7 Mio. €). Der Restbuchwert von 2,3 Mio. € entfällt in Höhe von 1,5 Mio. € (Vorjahr: 1,9 Mio. €) auf die Segmente Lithografie, Substrat Bonder und Fotomasken Equipment sowie in Höhe von 0,8 Mio. € (Vorjahr: 0,8 Mio. €) auf das Segment Sonstige. Unter den immateriellen Vermögenswerten ist außerdem die im Rahmen der Photonic-Systems-Akquisition erworbene Technologie ausgewiesen, die zum Stichtag einen Restbuchwert von 1,4 Mio. € (Vorjahr: 1,7 Mio. €) aufweist.

Größten Anteil am konzernweiten Sachanlagevermögen haben die beiden Betriebsgrundstücke in Garching und Sternenfels, die zum Jahresende einen Restbuchwert von 13,8 Mio. € aufweisen. Dort sind die SUSS MicroTec Lithography GmbH, die SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG sowie die SUSS MicroTec AG ansässig. Das Grundstück in Sternenfels gehört bereits seit 2010 zum Konzernvermögen, während das Grundstück in Garching in 2013 für insgesamt 8,9 Mio. € erworben wurde.

Das übrige Sachanlagevermögen ist von geringerer Bedeutung für die Vermögenslage des Konzerns, da die Gruppe auf kostenintensive Produktionsanlagen in der Regel nicht angewiesen ist. Die Investitionen beliefen sich (ohne Grund und Boden bzw. Gebäude) im Berichtsjahr auf 2,4 Mio. € im Vergleich zu 4,8 Mio. € im Vorjahr. Als größte Investition ist die Fertigstellung von Einbauten (insbesondere eines Reinraums) und die Neuanschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gemieteten Geschäftsräume der SUSS MicroOptics S.A. (Hauterive / Schweiz) zu nennen, die im Geschäftsjahr 2013 insgesamt Anschaffungskosten von rund 1,3 Mio. € verursachte.

Insgesamt ist das Sachanlagevermögen im Vergleich zum Vorjahr um 8,8 Mio. € gestiegen.

Die latenten Steueransprüche betragen zum Stichtag 5,7 Mio. € nach 1,5 Mio. € im Vorjahr. Sie erhöhten sich im Wesentlichen durch die Neubildung von aktiven latenten Steuern auf Verlustvorträge. Dabei wurde unterstellt, dass die ertragsteuerliche Organschaft in Deutschland (mit der SÜSS MicroTec AG als Organträger und den Organgesellschaften SÜSS MicroTec Lithography GmbH und SÜSS MicroTec Reman GmbH) die in 2013 aufgelaufenen Verluste vollständig nutzen wird. Für die Verlustvorträge der US-Gesellschaften wurden hingegen – unter Berücksichtigung der aktuellen Konzernplanung – keine aktiven latenten Steuern auf Verlustvorträge angesetzt.

Die kurzfristigen Vermögenswerte sind im Berichtsjahr um 10,2 Mio. € auf nun 132,9 Mio. € zurückgegangen. Dieser Rückgang resultierte im Wesentlichen aus einem geringeren Bestand an Vorratsvermögen und Kundenforderungen. Der Bestand an Wertpapieren ist ebenfalls zurückgegangen. Im Gegenzug sind jedoch die flüssigen Mittel zum Bilanzstichtag deutlich angestiegen.

Die Vorräte verringerten sich von 82,2 Mio. € zum Vorjahresstichtag auf 71,1 Mio. € zum Jahresende. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die zusätzlich vorgenommenen Wertberichtigungen zurückzuführen, die im Geschäftsjahr rund 10,5 Mio. € betrugen. Davon entfielen 9,3 Mio. € auf Sonderabwertungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung des Permanent Bond Cluster Bereichs. Der Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen hat sich von 27,5 Mio. € im Vorjahr auf nun 25,2 Mio. € reduziert. Auch der Bestand an unfertigen Erzeugnissen ist von 34,0 Mio. € im Vorjahr auf 23,3 Mio. € zurückgegangen. Im Gegenzug erhöhte sich der Bestand an Fertigerzeugnissen von 14,6 Mio. € im Vorjahr auf 24,2 Mio. €. Davon entfallen 22,6 Mio. € (Vorjahr: 12,6 Mio. €) auf Maschinen, die bereits an Kunden ausgeliefert wurden, bei denen die Abnahme jedoch noch aussteht. Auch der Bestand an Demonstrationsgeräten stieg von 19,9 Mio. € im Vorjahr auf 21,5 Mio. € an

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich von 21,8 Mio. € auf 11,1 Mio. €. Der Rückgang ist im Wesentlichen stichtagsbedingt.

Der Bestand an Wertpapieren des SÜSS MicroTec-Konzerns ging in 2013 von 11,4 Mio. € auf 2,1 Mio. € zurück. Bei den bilanzierten Wertpapieren handelt es sich um Unternehmens- und Staatsanleihen. Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich im Gegenzug von 25,2 Mio. € auf 45,1 Mio. €.

Der Zuwachs der sonstigen Vermögenswerte von 1,7 Mio. € im Vorjahr auf 2,5 Mio. € zum Jahresende ist im Wesentlichen auf einen höheren Stand an geleisteten Anzahlungen zurückzuführen, die sich stichtagsbedingt ergeben haben.

Die langfristigen Schulden erhöhten sich von 11,0 Mio. € auf 14,6 Mio. €. Größten Anteil an den langfristigen Schulden haben die Finanzverbindlichkeiten, die sich im Geschäftsjahr auf 10,3 Mio. € (Vorjahr: 4,0 Mio. €) beliefen. Neben dem langfristigen Teil des Darlehens Sternenfels wird hier auch der langfristige Teil des neuen

Darlehens ausgewiesen, das für die Grundstücksfinanzierung Garching aufgenommen wurde. Unter den sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten sind im Geschäftsjahr außerdem der langfristige Teil der Earn-Out-Verpflichtung in Höhe von 0,2 Mio. € für die Akquisition der SUSS MicroTec Photonic Systems sowie der langfristige Teil der noch ausstehenden Kaufpreisverpflichtung für den Erwerb der Minderheitenanteile an der SUSS MicroOptics in Höhe von 0,1 Mio. € ausgewiesen.

Bei den kurzfristigen Schulden war ein deutlicher Anstieg von 42,2 Mio. € im Vorjahr auf 55,8 Mio. € zum Bilanzstichtag zu verzeichnen. Größten Anteil an diesem Anstieg hatte der Stand der erhaltenen Kundenanzahlungen, die sich zum Jahresende auf 30,8 Mio. € (Vorjahr: 17,6 Mio. €) beliefen. Die Erhöhung ist im Wesentlichen stichtagsbedingt. Darüber hinaus sind auch die sonstigen Rückstellungen von 3,6 Mio. € im Vorjahr auf 5,9 Mio. € zum Jahresende angestiegen. In dem Betrag sind 2,0 Mio. € Rückstellungen für Verpflichtungen enthalten, die im Zusammenhang mit der Restrukturierung des Permanent Bond Cluster Bereichs stehen. Auch die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten haben sich um 0,9 Mio. € auf 1,2 Mio. € erhöht. Hier zeigt sich der kurzfristige Teil des neu aufgenommenen Darlehens, das der Grundstücksfinanzierung Garching dient. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich hingegen stichtagsbedingt um 1,3 Mio. € auf 5,6 Mio. € verringert.

Das Eigenkapital des SÜSS MicroTec-Konzerns hat sich seit dem 31. Dezember 2012 um 17,8 Mio. € auf 109,4 Mio. € verringert. Die Eigenkapitalquote sank im Jahresvergleich von 70,5 % auf 60,8 %. Die für das Vorjahr angegebenen Werte beziehen sich auf das Eigenkapital, das sich durch die retrospektive Anpassung der Vorjahreswerte aufgrund der erstmaligen Anwendung von IAS 19 (2011) ergeben hat. Die retrospektive Anpassung ist unter Punkt 2 D des Konzernanhangs detailliert erläutert.

GESAMTAUSSAGE ZUR WIRTSCHAFTLICHEN LAGE

Die Umsatz- und Ergebnissituation von SÜSS MicroTec hat sich im Berichtsjahr negativ dargestellt. Der SÜSS MicroTec-Konzern hat ein EBIT von minus 19,4 Mio. € erzielt.

Die Net Cash-Position des Konzerns hat sich jedoch verbessert. Der Net Cash-Bestand des Konzerns betrug zum Ende des Geschäftsjahres 35,7 Mio. € (Vorjahr: 32,3 Mio. €). Dadurch verfügt der Konzern über ausreichend finanziellen Spielraum, um Investitionen in neue Produktentwicklungen zu forcieren sowie andere strategische Aktivitäten zu finanzieren.

INVESTITIONEN

In 2013 hat die SÜSS MicroTec AG das Betriebsgrundstück am Firmensitz in Garching erworben. Dort hat neben der SÜSS MicroTec AG auch die SUSS MicroTec Lithography GmbH ihren Sitz. Die Anschaffungskosten für das Grundstück und die Betriebsgebäude beliefen sich (inklusive Erwerbsnebenkosten) auf insgesamt 8,9 Mio. €.

Bedingt durch die Struktur des Unternehmens sind Investitionen in technische Anlagen und Maschinen keine wesentliche Komponente in der Unternehmens-

entwicklung. Die wesentliche Wertschöpfung entsteht durch Design, Montage und Justage der Komponenten sowie der entsprechenden Softwaresteuerung. Für diese Tätigkeiten sind keine besonderen Anlagen und Maschinen erforderlich.

Wir gehen davon aus, dass sich die Investitionen in Sachanlagen langfristig in einem Bereich von ca. 1 bis 2 % des -Umsatzes bewegen werden. Eine Ausnahme stellt nur die in dem Segment Sonstige enthaltene Produktlinie Mikrooptik dar. In dieser Produktlinie wird Kleinserienfertigung betrieben, für die entsprechende Fertigungsmaschinen notwendig sind. Um diesen Bereich weiter auszubauen, ist die SUSS MicroOptic S.A. (Neuchâtel/Schweiz) im zweiten Halbjahr 2012 in neue gemietete Geschäftsräume umgezogen und hat in diese neuen Räume einen Reinraum eingebaut sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung neu angeschafft. Seit Mitte 2012 sind hierfür Kosten von insgesamt rund 3,0 Mio. € aufgelaufen.

Für Entwicklungsleistungen, die nach IFRS die Voraussetzungen zur Aktivierung erfüllen, werden immaterielle Vermögenswerte erfasst. Ein Teil der Investitionen ist daher dem Bereich immaterielle Vermögenswerte zuzuordnen.

Im Vorjahr sind dem Konzern durch die Akquisition Tamarack Scientific (nun: SUSS MicroTec Photonic Systems) immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen von insgesamt rund 4,2 Mio. € zugegangen. SUSS MicroTec Photonic Systems ist in Corona (Kalifornien/USA) in gemieteten Räumen angesiedelt und betreibt seine Wertschöpfungskette ähnlich wie die bereits zur SÜSS MicroTec-Gruppe gehörenden Produktionsunternehmen. Somit sind auch für die Produktion der Photonic-Systems-Maschinen keine besonderen Anlagen und Maschinen erforderlich.

DIE HOLDING – SÜSS MICROTEC AG

Die Aufgabe der Holding ist die Steuerung und Führung des SÜSS MicroTec-Konzerns. Sie übernimmt unter anderem die Aufgaben der strategischen Ausrichtung, beispielsweise der Ausweitung des Produktportfolios, Akquisitionen und Finanzfragen der gesamten Gruppe. Ebenso ist die Holding für Corporate Identity, Investor Relations und Marketing verantwortlich. Darüber hinaus übernimmt die Holding die Finanzierung von strategisch bedeutsamen Entwicklungsprojekten der operativen Tochtergesellschaften.

Die SÜSS MicroTec AG ist alleinige Anteilseignerin an den im Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Ausleihungen der Holding erfolgten nur an Tochterunternehmen und deren Tochterunternehmen. Die Ertragslage der Holding als Einzelgesellschaft ist nicht direkt von der Entwicklung unserer Märkte abhängig. Die Holding refinanziert sich im Wesentlichen durch Umlage der umlagefähigen Kosten auf die operativen Gesellschaften, durch Vermietung der Gebäude an den Standorten Garching und Sternenfels an Tochtergesellschaften, durch Zinserträge aus den Ausleihungen an Tochterunternehmen sowie durch bestehende Ergebnisabführungsverträge.

Darstellung der finanziellen Kennzahlen der Holding (in T€)

Gesellschaft	SMT AG (HGB)			
	2013	2012	Änderung	in %
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-20.601	7.595	-28.196	--
Eigenkapital	89.159	109.760	-20.601	-19%
Bilanzsumme	132.869	127.264	5.605	4%
EK Quote in %	67%	86%		
Anlagevermögen	88.336	76.816	11.520	15%
...% der Bilanzsumme	66%	60%		
Umlaufvermögen incl. RAP	44.534	50.448	-5.914	-12%
...% der Bilanzsumme	34%	40%		

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

Die immateriellen Vermögensgegenstände sanken im abgelaufenen Geschäftsjahr um 0,1 Mio. € und belaufen sich zum Stichtag auf 1,4 Mio. €. Der Rückgang beruht ausschließlich auf planmäßigen Abschreibungen.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 53,2 Mio. € und sind damit um 4,0 Mio. EUR geringer als im Vorjahr. Grund für den Rückgang sind außerplanmäßige Abschreibungen auf die Beteiligung an der SUSS MicroTec, Inc., Sunnyvale (USA). Durch die Änderung des Geschäftsmodells wird die Gesellschaft zukünftig lediglich eine für eine Vertriebsgesellschaft übliche EBIT-Marge erzielen. Entsprechend zeigt das zur Überprüfung der Werthaltigkeit von Finanzanlagen verwendete Modell eine Abwertung auf den Beteiligungsansatz an dieser Gesellschaft um rund 4,0 Mio. € an.

Der Anstieg der Ausleihungen an verbundene Unternehmen um rund 6,5 Mio. € resultiert überwiegend aus einer Aufstockung eines Darlehens, das der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona (USA) gewährt wurde.

Die kurzfristigen Forderungen gegen verbundene Unternehmen sanken um 16,7 Mio. €. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus dem Effekt aus dem Cashpooling und der Ergebnisabführung der SUSS MicroTec Lithography GmbH sowie aus der Veränderung von Intercompany-Forderungen gegen die SUSS MicroTec KK, Yokohama (Japan).

Im Berichtsjahr stieg die Liquiditätsposition der SÜSS MicroTec AG deutlich. Der Zuwachs resultiert im Wesentlichen aus dem positiven Free Cashflow der über das Konzern-Cashpooling mit der AG verbundenen Tochtergesellschaften. Der Anstieg der Liquiditätsposition wird im Zuwachs der Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 19,8 Mio. € sichtbar. Im Gegenzug ist der Bestand an Wertpapieren um rund 9,1 Mio. € zurückgegangen. Bei den Wertpapieren handelt es sich im Wesentlichen um Unternehmens- und Staatsanleihen, die über ein Rating im Investmentgradebereich verfügen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen stiegen im Berichtsjahr um 19,8 Mio. €. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Verlustübernahme der SUSS MicroTec Lithography GmbH (aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages) sowie aus Veränderungen der Intercompany-Verbindlichkeiten gegenüber der SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich im Verlauf des Jahres 2013 um 7,3 Mio. €. Der Anstieg resultiert aus einem neu aufgenommenen Bankdarlehen zur Finanzierung des Betriebsgrundstückes in Garching in Höhe von 7,5 Mio. €. Gegenläufig wirkten sich die planmäßigen Tilgungen eines Darlehens zur Finanzierung des Betriebsgrundstücks in Sternenfels aus.

Der Rückgang des Eigenkapitals um 20,6 Mio. € ist ausschließlich auf den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres von 20,6 Mio. € zurückzuführen.

WESENTLICHE EREIGNISSE MIT EINFLUSS AUF DIE ERTRAGSLAGE DER HOLDING

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ergab sich für das Geschäftsjahr 2013 ein Jahresfehlbetrag von 20,6 Mio. € (Vorjahr: Jahresüberschuss 7,6 Mio. €).

Auf Grund des zum 01. Januar 2011 gültigen Ergebnisabführungsvertrages mit der SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching, wurde bei der Holding ein Aufwand aus Verlustübernahme in Höhe von 18,2 Mio. € (Vorjahr: Ertrag aus Gewinnübernahme 6,6 Mio. €) aufwandswirksam erfasst. Zudem wurde eine Wertberichtigung auf den Beteiligungsansatz der SUSS MicroTec, Inc. von 4,0 Mio. € gebucht.

Gegenläufig wirkte sich ein Ertrag aus Gewinnübernahme von 0,8 Mio. € (Vorjahr: 0,5 Mio. €) aus, der auf Grund des im Geschäftsjahr 2008 geschlossenen Ergebnisabführungsvertrages mit der SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleissheim, vereinnahmt wurde. Darüber hinaus hat die Holding aus einer Dividendenausschüttung der SUSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu (Taiwan) Beteiligungserträge von rund 0,7 Mio. € erzielt.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind überwiegend Fremdwährungsgewinne in Höhe von 1,8 Mio. € (Vorjahr: 1,9 Mio. €) und Mieterlöse in Höhe von 1,5 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €) enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten – neben laufenden Aufwendungen für die Verwaltung – Fremdwährungsverluste in Höhe von 0,6 Mio. € (nach 2,0 Mio. € im Vorjahr).

Die Zinsaufwendungen sanken im Geschäftsjahr um 0,5 Mio. €, was im Wesentlichen auf das im Dezember 2012 zurückgeführte Schuldscheindarlehen und den damit verbundenen Zinsen zurückzuführen ist. Das neu aufgenommene Bankdarlehen in Höhe von 7,5 Mio. € wurde erst im Dezember 2013 valuiert und ausgezahlt, so dass darauf im abgelaufenen Geschäftsjahr nur geringe Zinsaufwendungen entfielen.

In der SÜSS MicroTec AG waren im Geschäftsjahr 2013 durchschnittlich 20 (Vorjahr:

20) Mitarbeiter tätig.

Die kurz- und mittelfristige Entwicklung der SÜSS MicroTec AG hängt vor allem von der Entwicklung der Finanz- und Ertragslage wesentlicher Tochtergesellschaften ab. Die Finanz- und Ertragslage der Tochtergesellschaften ist ausschlaggebend für die Höhe des zinstragenden Nettofinanzierungssaldos der Holding und für die Ausschüttung und Abführung von Ergebnissen an die Muttergesellschaft. Zudem ist das Ergebnis beeinflusst von Fremdwährungseffekten, die sich aus der Veränderung der Wechselkurse von USD und JPY ergeben.

MITARBEITER IM KONZERN

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Wissen stellen einen erheblichen Teil unseres Unternehmenswerts dar. Auch die Anlernzeiten, insbesondere im technischen Bereich, sind aufgrund der sehr spezifischen Produkte länger als ein Jahr. Daher sind ein motivierendes Umfeld und eine leistungsgerechte Bezahlung Grundvoraussetzungen für die Erhaltung bestehender und für die Anwerbung qualifizierter neuer Mitarbeiter.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2013 waren 655 (Vorjahr: 704) Mitarbeiter im Konzern beschäftigt.

BERICHT ZU WESENTLICHEN GESCHÄFTEN MIT NAHE STEHENDEN PERSONEN

Im Geschäftsjahr 2013 ergaben sich keine wesentlichen Geschäfte mit nahestehenden Personen, die den Angabepflichten nach IAS 24 unterliegen.

Übernahmerechtliche Angaben

ANGABEN GEMÄß § 289 ABS. 4 HGB UND § 315 ABS. 4 HGB

1. ZUSAMMENSETZUNG DES GEZEICHNETEN KAPITALS

Zum 31. Dezember 2013 belief sich das gezeichnete Kapital der Gesellschaft auf 19.115.538,00 € (Vorjahr: 19.115.538,00 €). Das Grundkapital ist in 19.115.538 (Vorjahr: 19.115.538) auf Namen lautende, nennwertlose Stückaktien unterteilt, auf die ein anteiliger Betrag von 1,00 € je Aktie entfällt. Die Aktien sind voll eingezahlt.

Mit allen Aktien sind die gleichen Rechte und Pflichten verbunden. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme und ist maßgebend für den Anteil der Aktionäre am Gewinn der Gesellschaft. Die Rechte und Pflichten der Aktionäre ergeben sich im Einzelnen aus den Regelungen des AktG, insbesondere aus den §§ 12, 53a ff., 118 ff. und 186 AktG.

Gemäß § 67 Abs. 2 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Die Aktionäre haben der Gesellschaft die zur Führung des Aktienregisters erforderlichen Daten zu übermitteln.

2. BESCHRÄNKUNGEN, DIE STIMMRECHTE ODER DIE ÜBERTRAGUNG VON AKTIEN BETREFFEN

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, bestehen nach der Satzung nicht. Wir haben auch keine Kenntnis von dem Bestehen derartiger Vereinbarungen zwischen Aktionären.

3. BETEILIGUNGEN AM KAPITAL, DIE 10 % DER STIMMRECHTE ÜBERSCHREITEN

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital der Gesellschaft, die 10 % der Stimmrechte erreichen oder überschreiten, sind uns nicht gemeldet worden und auch nicht bekannt.

4. AKTIEN MIT SONDERRECHTEN, DIE KONTROLLBEFUGNISSE VERLEIHEN

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht.

5. ART DER STIMMRECHTSKONTROLLE, WENN ARBEITNEHMER AM KAPITAL BETEILIGT SIND UND IHRE KONTROLLRECHTE NICHT UNMITTELBAR AUSÜBEN

Soweit die SÜSS MicroTec AG im Rahmen ihres Mitarbeiteraktienprogramms Aktien an Mitarbeiter ausgibt, werden die Aktien den Mitarbeitern unmittelbar übertragen. Die begünstigten Mitarbeiter können die ihnen aus den Mitarbeiteraktien zustehenden Kontrollrechte wie andere Aktionäre unmittelbar nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen der Satzung ausüben.

6. GESETZLICHE VORSCHRIFTEN UND BESTIMMUNGEN DER SATZUNG ÜBER DIE ERNENNUNG UND ABBERUFUNG VON VORSTANDSMITGLIEDERN UND DIE ÄNDERUNG DER SATZUNG

Die Bestellung und die Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind in den §§ 84 und 85 AktG geregelt. Danach werden Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat auf höchstens fünf Jahre bestellt. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. Über die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern beschließt der Aufsichtsrat mit der einfachen Mehrheit der Stimmen.

Der Vorstand besteht gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung aus mindestens zwei Personen, wobei die Zahl der Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat bestimmt wird. Der Aufsichtsrat kann gemäß § 84 AktG und § 7 Abs. 2 der Satzung einen Vorsitzenden bzw. Sprecher des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden bzw. Sprecher ernennen.

Fehlt ein erforderliches Vorstandsmitglied, wird das Mitglied nach § 85 AktG in dringenden Fällen auf Antrag eines Beteiligten gerichtlich bestellt. Der Aufsichtsrat kann gemäß § 84 Abs. 3 AktG die Bestellung zum Vorstandsmitglied und die Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

Eine Änderung der Satzung bedarf nach § 179 AktG eines Beschlusses der Hauptversammlung. Die Befugnis zu Änderungen, die nur die Fassung betreffen, ist gemäß § 17 Abs. 3 der Satzung dem Aufsichtsrat übertragen.

Satzungsändernde Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen nach §§ 133 und 179 AktG in Verbindung mit § 26 Abs. 1 der Satzung der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen und einer einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals, soweit nicht das Gesetz zwingend eine größere Mehrheit vorschreibt.

7. BEFUGNISSE DES VORSTANDS, AKTIEN AUSZUGEBEN ODER ZURÜCKZUKAUFEN

Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 21. Juni 2016 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt 6.500.000,00 € durch Ausgabe von bis zu 6.500.000 neuen Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Weiterhin ist der Vorstand ermächtigt, in der Zeit bis zum 18. Juni 2018 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 2.500.000,00 € durch Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18. Juni 2018 eigene Aktien der Gesellschaft bis zu insgesamt 10 % des bei der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals in Höhe von 19.115.538,00 € zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausgeübt werden. Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstandes über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebotes bzw. einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung an die Aktionäre zur Abgabe eines Verkaufsangebotes erfolgen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken zu verwenden.

8. WESENTLICHE VEREINBARUNGEN DER GESELLSCHAFT, DIE UNTER DER BEDINGUNG EINES KONTROLLWECHSELS INFOLGE EINES ÜBERNAHMEANGEBOTS STEHEN

Mit den drei Banken des bestehenden Konsortiums bestehen unter einem gemeinsamen Sicherheitenpool jeweils bilaterale Kreditverhältnisse, die hinsichtlich ihrer Ausgestaltung bzw. Konditionen Unterschiede aufweisen. So enthält ein Kreditverhältnis ein außerordentliches Kündigungsrecht, falls eine Änderung der Gesellschaftsverhältnisse / ein Change-of-Control eintritt und zwischen den Parteien keine rechtzeitige Einigung über die Fortsetzung zu gegebenenfalls veränderten

Konditionen, z.B. hinsichtlich der Verzinsung, der Besicherung oder sonstiger Absprachen, erzielt wurde.

Sonstige wesentliche Vereinbarungen der SÜSS MicroTec AG, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, bestehen nicht.

9. ENTSCHÄDIGUNGSVEREINBARUNGEN DER GESELLSCHAFT, DIE FÜR DEN FALL EINES ÜBERNAHMEANGEBOTS MIT VORSTANDSMITGLIEDERN ODER ARBEITNEHMERN GETROFFEN SIND

Entschädigungsvereinbarungen o. ä. mit Arbeitnehmern bzw. Mitgliedern des Vorstands für den Fall eines Übernahmeangebots existieren nicht.

Zusammenfassend bestehen keine besonderen Regelungen bezüglich der mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte und hieraus resultierenden Kontrollmöglichkeiten, weder durch Einrichtung besonderer Aktiengattungen noch durch Stimmrechts- oder Übertragungsbeschränkungen. Über die gesetzlichen Regelungen hinausgehende Vorschriften über die Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind nicht vorhanden. Wesentliche Geschäftsbereiche oder Aktivitäten der SÜSS MicroTec AG können im Fall eines Übernahmeangebots durch vorliegende „Change-of-Control“-Klauseln nicht wegfallen.

Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289a HGB

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben mit Datum vom 4. März 2014 eine gemeinsame Erklärung zur Unternehmensführung nach §289a HGB abgegeben und diese auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.suss.de > Investor Relations > Corporate Governance > Erklärung zur Unternehmensführung allgemein zugänglich gemacht.

Vergütungsbericht

VERGÜTUNG DES VORSTANDS

SÜSS MicroTec legt die Vorstandsvergütung bereits seit mehreren Jahren individualisiert offen. Ziel des Systems der Vorstandsvergütung bei SÜSS ist es, einen Anreiz für die langfristige und auf Nachhaltigkeit angelegte Unternehmensführung zu setzen. Besondere Leistungen sollen besonders vergütet werden, aber auch Zielverfehlungen müssen zu einer spürbaren Verringerung der Vergütung führen, darüber hinaus muss sich die Vergütung an der Größe und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens orientieren.

Für die Festlegung der Vorstandsvergütung ist der Aufsichtsrat zuständig. Das Aufsichtsratsplenum beschließt und überprüft auf regelmäßiger Basis das Vergütungssystem für den Vorstand und beschließt über die Vorstandsverträge.

Der Aufsichtsrat hat sich eingehend mit der Ausrichtung der Vorstandsvergütung an einer nachhaltigen Unternehmensführung befasst. Hierzu wurde auch ein externer Vergütungsberater hinzugezogen.

VERGÜTUNGSSTRUKTUR

Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder besteht aus erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Vergütungsbestandteilen.

FESTE VERGÜTUNG

Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. der Verantwortung bestimmt. Die erfolgsunabhängigen Teile der Vergütung bestehen aus dem Grundgehalt sowie Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens und Zuschüssen zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Darüber hinaus sind den Mitgliedern des Vorstands Versorgungszusagen (Alters-, Berufsunfähigkeits- und Witwenrente) in Form von Direktversicherungen (Kapitallebensversicherungen) gemacht worden.

ERFOLGSBEZOGENE VERGÜTUNG

Die erfolgsbezogene Vergütung besteht aus einer variablen Vergütung. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2012 bestand zudem eine aktienbasierte Vergütung.

VARIABLE VERGÜTUNG

Die variable Vergütung kann seit dem 1. Januar 2012 höchstens 150 % der Festvergütung zu Beginn des betreffenden Geschäftsjahres betragen. 70 % der variablen Vergütung bestimmen sich nach Jahreszielen und 30 % nach Mehrjahreszielen.

AN JAHRESZIELEN ORIENTIERTE VARIABLE -VERGÜTUNG (VARIABLE VERGÜTUNG A)

Die Jahresziele (Auftragseingang, Umsatz, EBITDA und Free Cashflow) werden für jeweils ein Geschäftsjahr vom Aufsichtsrat festgelegt. Werden diese Ziele zu 70 % oder weniger erreicht, entfällt diese Vergütungskomponente. Bei einer Zielerreichung von 130 % ist der Maximalbetrag erreicht. Beträgt der Zielerreichungsgrad für ein bestimmtes Ziel zwischen 70 % und 130 %, ist der entsprechende anteilige Betrag an der variablen Vergütung im Verhältnis zum Zielerreichungsgrad zu ermitteln.

Die an Jahreszielen orientierte Vergütung wird jährlich ermittelt. Im Interesse einer Förderung der langfristigen Unternehmensentwicklung steht den Vorstandsmitgliedern aber nur die Hälfte der variablen Vergütung A endgültig zu. In Bezug auf die andere Hälfte des Auszahlungsbetrages ("Vorbehaltshälfte") ist das Vorstandsmitglied verpflichtet, in dem ersten Handelsfenster nach Auszahlung des Auszahlungsbetrages Aktien der Gesellschaft zu erwerben und für eine Sperrfrist von drei Jahren, gerechnet ab dem letzten Tag des Handelsfensters, in dem die Aktien erworben wurden, in einem auf seinen Namen lautenden Depot zu halten.

AN MEHRJAHRESZIELEN ORIENTIERTE VARIABLE -VERGÜTUNG (VARIABLE VERGÜTUNG B)

30 % der variablen Vergütung entfallen auf mehrjährige Ziele, die für einen Zeitraum von regelmäßig drei Geschäftsjahren festgelegt werden.

Erstmalig erfolgte eine Festlegung der Mehrjahresziele für die Geschäftsjahre 2010 bis 2012. Dabei wurden für die jeweiligen Geschäftsjahre Zwischenziele („Milestones“) definiert, die in den einzelnen Geschäftsjahren erreicht werden sollten. Der Aufsichtsrat legte nach Abschluss eines Geschäftsjahres und nach Anhörung

des Vorstandes durch Beschluss den Zielerreichungsgrad in Bezug auf die für die Ziele vereinbarten jeweiligen Milestones zwischen 70 % und 130 % vorläufig fest. Abhängig vom festgelegten Zielerreichungsgrad für die jeweiligen Milestones wurde der Anteil an der variablen Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr festgelegt. Dieser Anteil wurde zu 50 % als Vorschuss ausgezahlt und zu 50 % auf das Verrechnungskonto für die variable Vergütung als vorläufiges Guthaben vorgetragen. Nach Ablauf der Gesamtlaufzeit der mehrjährigen Ziele stellte der Aufsichtsrat für diese Ziele insgesamt in einer Bandbreite von 70 % bis 130 % den Grad der Zielerreichung für die jeweiligen Ziele abschließend fest. Für die endgültige Berechnung der variablen Vergütungsanteile für die in die Gesamtlaufzeit fallenden Geschäftsjahre waren nur diese abschließend festgestellten Zielerreichungsgrade maßgeblich, bezogen auf den Mittelwert der Maximalbeträge der betreffenden Geschäftsjahre. Die zuvor festgestellten Zielerreichungsgrade hinsichtlich der Milestones dienten nur der Bemessung der entsprechenden Vorschusszahlung.

Für die Geschäftsjahre 2013 bis 2015 erfolgte die erneute Festlegung von Mehrjahreszielen (EBIT-Marge) für drei Geschäftsjahre im Voraus. Werden diese Ziele zu 70 % oder weniger erreicht, entfällt diese Vergütungskomponente. Bei einer Zielerreichung von 150 % ist der Maximalbetrag erreicht. Beträgt der Zielerreichungsgrad für ein bestimmtes Ziel zwischen 70 % und 150 %, ist der entsprechende anteilige Betrag an der variablen Vergütung im Verhältnis zum Zielerreichungsgrad zu ermitteln. Die an Mehrjahreszielen orientierte variable Vergütung B wird jährlich ermittelt und für das jeweilige Geschäftsjahr vollständig ausgezahlt.

ABFINDUNGEN

In Vorstandsverträgen ist für den Fall, dass die Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund vorzeitig endet, eine Ausgleichszahlung vorgesehen. Diese ist auf maximal zwei Jahresvergütungen einschließlich Nebenleistungen begrenzt (Abfindungs-Cap) und vergütet nicht mehr als die Restlaufzeit des jeweiligen Anstellungsvertrages. Eine Zusage für Leistungen aus Anlass der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit infolge eines Kontrollwechsels („Change-of-control“-Regelung) ist in den bestehenden Vorstandsverträgen nicht enthalten.

Für die Mitglieder des Vorstandes wurde folgende Vergütung für das Geschäftsjahr 2013 festgesetzt:

Vorstand	Grundgehalt in €*	Variable Vergütung in €	Sonstige Leistungen in €**	Aufwand für Altersversorgung in €
Frank Averdung	316.929,60	128.089,73	6.577,20	2.148,00
Michael Knopp	250.226,32	98.202,12	6.577,20	2.148,00

Für die Mitglieder des Vorstandes wurde folgende Vergütung für das Geschäftsjahr 2012 festgesetzt:

Vorstand	Grundgehalt in €* 	Variable Vergütung in €	Sonstige Leistungen in €**	Aufwand für Altersversorgung in €
Frank Averdung	316.794,24	398.046,17	6.585,60	2.148,00
Michael Knopp	237.559,80	300.193,44	6.585,60	2.148,00

* Im Grundgehalt enthalten sind jeweils Zuschüsse zur Krankenversicherung sowie ein Firmenwagen mit privater Nutzungsmöglichkeit

** Zuschuss zur freiwilligen Rentenversicherung

Ergänzend verweisen wir auf die Angaben im Anhang.

PENSIONEN

Es bestehen keine Pensionsrückstellungen für Mitglieder oder ehemalige Mitglieder des Vorstandes (Vorjahr: 35 Tsd. €).

VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 19 der Satzung der SÜSS MicroTec AG geregelt. Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 1.500,00 € pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, die sich an der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats 45.000,00 €, sein Stellvertreter 40.000,00 € und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 35.000,00 € pro Geschäftsjahr als feste Vergütung. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben der Gesellschaft den rechnerischen pro-Kopf-Anteil der von der Gesellschaft gezahlten D&O-Versicherungsprämie erstattet.

Aufsichtsratsvergütung 2013

Aufsichtsrat	Vergütung in €	Sitzungsgeld in €	Abzug für anteilige D&O Versicherungs- prämie in €
Dr. Stefan Reineck (Aufsichtsratsvorsitzender)	45.000,00	10.500,00	1.914,82
Jan Teichert (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)	40.000,00	10.500,00	957,41
Gerhard Pegam	35.000,00	10.500,00	638,27

Aufsichtsratsvergütung 2012

Aufsichtsrat	Vergütung in €	Sitzungsgeld in €	Abzug für anteilige D&O Versicherungs- prämie in €
Dr. Stefan Reineck (Aufsichtsratsvorsitzender)	45.000,00	10.500,00	1.914,82
Jan Teichert (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)	40.000,00	10.500,00	957,41
Gerhard Pegam	35.000,00	10.500,00	638,27

Im Geschäftsjahr 2013 haben weder die ausgeschiedenen noch die aktuellen Mitglieder des Aufsichtsrats eine Vergütung bzw. Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, erhalten.

Nachtragsbericht

BERICHT ZU WESENTLICHEN EREIGNISSEN NACH ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES

Wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag, die einen signifikanten Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Konzerns haben, haben sich nicht ergeben.

STIMMRECHTSMITTEILUNGEN NACH DEM STICHTAG

Die Henderson Group Plc, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 27. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,13 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,13 % (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 WpHG zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3 % oder mehr direkt von der Henderson Horizon Fund – Pan European Smaller Companies Fund gehalten.

Der Henderson Horizon Fund – Pan European Smaller Companies Fund, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. Januar 2014 mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,17 % beträgt (606.922 Stimmrechte).

Die Henderson Global Investors (Holdings) PLC, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,13 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,13 % (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3 % oder mehr direkt von der Henderson Horizon Fund – Pan European Smaller Companies Fund gehalten.

Die Henderson Global Investors Limited, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,13 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,13 % (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3 % oder mehr direkt von der Henderson Horizon Fund – Pan European Smaller Companies Fund gehalten.

Die Baillie Gifford & Co, Edinburgh, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 27. Februar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 26. Februar 2014 die Schwelle von 3% überschritten hat und zu diesem Tag 3,003 % beträgt (574.032 Stimmrechte). Davon sind ihr 1,275% (243.632 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG und 1,728% (330.400 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG sowie § 22 Abs. 1 Satz 2 (via Baillie Gifford Overseas Limited) zuzurechnen.

Berichterstattung über die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

RISIKOMANAGEMENT-SYSTEM

Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen ist das Risikomanagement-System seit Langem Bestandteil der Unternehmensführung.

Neben kurzfristigen (operativen) Risiken befasst sich das Risikomanagement bei SÜSS MicroTec auch mit langfristigen (strategischen) Entwicklungen, die sich negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken können. Auf der Grundlage eines chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potenziellen Risiken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr streben wir stets ein Optimum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter Risikoakzeptanz an. Das Bewusstsein für Risiken sollte nicht die Fähigkeit beeinträchtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.

Organisation und Dokumentation des Risikomanagements

Die Organisation des Risikomanagements orientiert sich an der funktionellen und hierarchischen Struktur des Konzerns. Mit der Einführung des Risikomanagement-Systems wurde ein Risikomanagement-Beauftragter ernannt, der alle drei Monate direkt an den Vorstand berichtet.

Das eingerichtete Risikofrüherkennungs-System wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung jährlich geprüft.

Risikoidentifikation

Alle berichtspflichtigen Einheiten des Konzerns veranstalten mindestens einmal jährlich einen Workshop, der neben der Retrospektive vor allem auf zukünftige Entwicklungen eingeht. Außerdem dienen die Workshops dazu, die konzernweit einheitliche Bewertungsmethodik sicherzustellen. Auf Basis dieser Workshops werden vierteljährlich Risikoberichte erstellt, die bekannte Risiken einer kritischen Würdigung unterziehen und neue Themen aufnehmen.

Plötzlich auftretende Risiken werden darüber hinaus unverzüglich an den Risikomanagement-Beauftragten der jeweiligen Einheit gemeldet.

Wichtiger Bestandteil zur Risikofrüherkennung ist das Qualitätsmanagement des Konzerns. An den großen Produktionsstandorten liegt eine Zertifizierung nach ISO 9001 vor, die ein zuverlässiges, prozess- und systemorientiertes Qualitätsmanagement bestätigt. Klar strukturierte und eindeutig dokumentierte Prozesse im Rahmen des Qualitätsmanagements sorgen nicht nur für Transparenz, sondern sind mittlerweile bei den meisten Produktionskunden eine Vorbedingung für die erfolgreiche Vermarktung unserer Maschinen.

Risikobewertung

Die Bewertung von Risiken erfolgt zum einen durch die Angabe der maximalen Schadenshöhe, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Auf dieser Grundlage wird der Risikowert durch Einbeziehung einer Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt, die entsprechende Gegenmaßnahmen berücksichtigt und, wie auch die Ermittlung der maximalen Schadenshöhe, auf den Kenntnissen und Erfahrungen der Risikobeauftragten beruht und somit stets dem aktuellsten Stand entspricht. Die Angabe des Risikowerts bezieht sich jeweils auf den Zeitraum der kommenden 12 bzw. 24 Monate.

Die identifizierten Risiken werden mit Hilfe einer Risikomatrix in drei verschiedene Risikoklassen eingeordnet, die sowohl die mögliche Schadenshöhe als auch die Eintrittswahrscheinlichkeit berücksichtigen. Risiken ab einer Schadenshöhe von 10 Mio. € - gemessen an der Höhe des Liquiditätsabflusses – werden als „bestandsgefährdend“ angesehen.

Risikohandhabung

Je nach Art des Risikos und der Höhe der Bewertung werden abgestuft Maßnahmen der Risikovermeidung bzw. -minderung getroffen. Dabei orientiert sich das Risikomanagement stets an der einleitend erwähnten Maxime eines chancenorientierten Umgangs mit Risiken.

Die Risikoabwendung und Organisation von Gegenmaßnahmen wird subsidiär durchgeführt. Die Risikoverantwortlichen beziehungsweise die Berichtseinheiten sind zur Entwicklung und Umsetzung von Abwehrstrategien gegen erkannte Risiken verpflichtet. Sollten ihre Kompetenzen nicht zur Umsetzung ausreichen, fordern sie Hilfe von höheren Ebenen an.

Aus der weltweiten Tätigkeit in der Hochtechnologie ergeben sich allgemeine und aktuelle Risiken für das Unternehmen. Der Vorstand hat zur Überwachung von Risiken in geeigneter Weise Maßnahmen getroffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand der SÜSS MicroTec-Gruppe gefährden, rechtzeitig zu erkennen.

Beschreibung der wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagements im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess gemäß § 289 Abs. 5 HGB und § 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB

Das Risikomanagementsystem im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess zielt darauf ab, das Risiko der Falschaussage in der Konzernrechnungslegung sowie in der externen Berichterstattung zu minimieren. Es dient im ersten Schritt der Identifikation und Bewertung, weiterhin der Begrenzung und Überprüfung erkannter Risiken im Konzernrechnungslegungsprozess, die dem Ziel der Regelungskonformität des Konzernabschlusses entgegenstehen könnten. Das interne Kontrollsystem des Rechnungslegungsprozesses soll gewährleisten, dass trotz identifizierter Risiken in der Finanzberichterstattung ein mit hinreichender Sicherheit regelungskonformer Konzernabschluss erstellt wird.

Die Verantwortung für die Einrichtung und wirksame Unterhaltung angemessener Kontrollen über die Finanzberichterstattung liegt beim Management der SÜSS MicroTec AG, das zu jedem Geschäftsjahresende die Angemessenheit und Wirksamkeit des Kontrollsystems beurteilt. Zum 31. Dezember 2013 hat das Management die Wirksamkeit der internen Kontrollen über die Finanzbericht-

erstattung festgestellt. Allerdings bestehen bei jedem Kontrollsystem gewisse Einschränkungen hinsichtlich seiner Wirksamkeit.

Eine absolute Sicherheit kann auch mit angemessenen und funktionsfähigen Systemen nicht gewährleistet werden.

Die SÜSS MicroTec AG nutzt ihr konzernweit gültiges Bilanzierungshandbuch zur einheitlichen Regelung von Bilanzierungsgrundsätzen. Durch eindeutige Vorgaben soll der Ermessensspielraum der Mitarbeiter bei Ansatz und Bewertung von Vermögenswerten und Schulden eingeschränkt und somit das Risiko konzernuneinheitlicher Rechnungslegungspraktiken verringert werden. Den Tochtergesellschaften sind bestimmte Berichtspflichten und -umfänge zwingend vorgegeben. Die Einhaltung der Berichtspflichten und -fristen wird durch die zentralen Abteilungen Finanzen und Controlling überwacht.

Die Buchhaltung der Tochtergesellschaften wird entweder lokal mit eigenen Mitarbeitern oder mit der Unterstützung von externen Buchführungsfirmen oder Steuerberatungsgesellschaften durchgeführt. Dabei werden unterschiedliche EDV-Systeme eingesetzt. Alle deutschen Gesellschaften arbeiten bereits seit 2008 mit SAP. Seit 2010 wird SAP auch bei der SÜSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu (Taiwan), verwendet. 2011 wurde SAP schließlich bei der SÜSS MicroTec, Inc., Sunnyvale (Kalifornien / USA) implementiert. Das Reporting an die Konzernzentrale erfolgt mit Hilfe der Managementinformationssysteme „INFOR PM Application Studio“. Die Einzelabschlüsse werden schließlich über ein zentrales Konsolidierungssystem zusammengeführt. Auf Konzernebene wird innerhalb der Finanzabteilung und des Controllings die Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der von den Tochtergesellschaften vorgelegten Einzelabschlüsse überprüft. Kontrollen im Rahmen des Konsolidierungsprozesses, wie beispielsweise der Schulden- oder der Aufwands- und Ertragskonsolidierung, erfolgen manuell. Eventuelle Mängel werden korrigiert und an die Tochtergesellschaften zurück berichtet. Die eingesetzten Finanzsysteme sind durch entsprechende Berechtigungskonzepte und Zugangsbeschränkungen vor Missbrauch geschützt. Zugriffsberechtigungen werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls aktualisiert.

ALLGEMEINE WIRTSCHAFTLICHE RISIKEN UND BRANCHENRISIKEN

Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Unser Geschäftsumfeld wird durch die regionalen wie auch die weltweiten konjunkturellen Bedingungen beeinflusst. Nach einem verhaltenen Start ins Jahr 2013 hat die Weltkonjunktur Mitte des Jahres an Schwung gewonnen. Das weltweite Bruttoinlandsprodukt ist in 2013 um real 3,0 % gestiegen (nach einem Anstieg um real 3,1 % im Vorjahr). Auch das weltweite Handelsvolumen hat in 2013 im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,7 % zugelegt. Der deutlichste Anstieg im Bruttoinlandsprodukt war erneut in den aufstrebenden asiatischen Volkswirtschaften (China, Indien, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Thailand und Vietnam) zu verzeichnen. Hier wurden für 2013 Wachstumsraten zwischen 4,4 % und 7,7 % festgestellt. Auch die Bruttoinlandsprodukte der USA und Japans wuchsen in 2013 um 1,9 % bzw. 1,7 %, während in den Volkswirtschaften des Euro-Raums insgesamt ein Rückgang um rund 0,4 % zu verzeichnen war.²

² Quelle: WEO Update des International Monetary Fund (IMF) vom 21. Januar 2014

Der gesamte Halbleitermarkt ist in 2013 um rund 4,8 % gewachsen. So summierte sich das Gesamtvolumen im Halbleitermarkt in 2013 auf rund 305,6 Mrd. USD (nach 291,6 Mrd. USD in 2012)³ und erreichte damit ein historisch einmalig hohes Niveau. Der Markt für Halbleiter-Equipment wies dagegen erneut einen Rückgang auf. Semi hat in seiner Pressemeldung vom Dezember 2013 für das abgelaufene Geschäftsjahr ein Gesamtvolumen von rund 32,02 Mrd. USD prognostiziert, nachdem in 2012 ein Gesamtvolumen von rund 36,93 Mrd. USD und in 2011 ein Gesamtvolumen von rund 43,53 Mrd. USD erreicht wurde. In 2013 wird somit im Halbleiter-Equipment-Markt ein Rückgang um rund 13,3 % erwartet, nachdem bereits im Vorjahr ein Rückgang um 15,2 % festgestellt wurde⁴.

SÜSS MicroTec verzeichnete in 2013 einen Umsatzrückgang um rund 18 %. Der höchste Umsatzanteil wurde wieder in den Regionen China, Taiwan und sonstiges Asien erzielt. Die Umsätze in diesen Regionen waren jedoch im Vergleich zum Vorjahr rückläufig und verzeichneten ein Minus von 14 %. Auch die Umsätze mit Kunden in den USA reduzierten sich deutlich um 25 %. Der prozentual größte Rückgang war jedoch in Japan zu verzeichnen: Die Umsätze mit japanischen Kunden waren um rund 69 % geringer als im Vorjahr. Lediglich die Umsätze in Europa lagen etwas über Vorjahresniveau. Der Auftragseingang erreichte mit 135 Mio. € ein um 14 % geringeres Niveau als noch in 2012. Mit 29 Mio. € war vor allem der Auftragseingang des 4. Quartals 2013 unterdurchschnittlich gering.

Zyklische Marktschwankungen und Marktentwicklung

Die schwierige Einschätzbarkeit der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung gehört unverändert zu den größten Risiken des Unternehmens. Insbesondere die Halbleiterindustrie, die zu unseren Absatzmärkten zählt, ist von starken Marktzyklen geprägt. Den damit verbundenen Risiken begegnen wir durch schlanke Strukturen, die bei schwacher Geschäftsentwicklung zügig angepasst und gegebenenfalls durch Outsourcing ergänzt werden können. Die starken Marktzyklen der Halbleiterindustrie bieten unserem Unternehmen jedoch – je nach Art der Entwicklung – auch zahlreiche neue Chancen im Markt, die kurzfristig für einen starken Anstieg der Auftragseingänge und Umsätze sorgen können.

Marktpositionierung

Neue technologische Entwicklungen des Wettbewerbs könnten Teile des Produktportfolios und damit Teile des Potenzials ungeplant obsolet machen, wenn neue Technologien schnellere, effizientere oder günstigere Lösungen für das gleiche Problem bieten würden. Diesem Risiko begegnen wir vor allem durch gezielte Forschung und Entwicklung und durch einen laufenden Abgleich der Entwicklungsplanung mit den wesentlichen Kunden.

Durch unsere langjährige Erfahrung und unsere Technologiekompetenz werden wir als Marktführer in Mikrostrukturanwendungen wahrgenommen. Wir gehen davon aus, dass wir auch in Zukunft vom schnellen technologischen Wandel profitieren können und durch unsere Neuentwicklungen und durchdachten Prozesslösungen unsere Marktstellung weiter ausbauen können.

³ Quelle: Semiconductor Industry Association, Pressemeldung vom 3. Februar 2014

⁴ Quelle: Semi, Pressemeldung vom 3. Dezember 2013

Abhängigkeit von einzelnen „Knowhow“-Trägern

In einzelnen Bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen einzelner Mitarbeiter abhängig, vor allem im Bereich der Forschung und Entwicklung. Eine Nichtverfügbarkeit dieser Mitarbeiter für die Gruppe stellt ein entsprechendes Risiko dar, das durch interne Dokumentationspflichten kontrolliert wird.

BETRIEBLICHE RISIKEN

Vermögens- und Ertragslage

Angesichts des hohen Bestands an flüssigen Mitteln, der hohen Eigenkapitalquote und der schlanken Kostenstruktur sind die Risiken, die sich für SÜSS MicroTec aus der aktuellen Vermögens- und Ertragslage ergeben könnten, begrenzt. Durch die vorgenommenen Restrukturierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Permanent Bond Cluster Bereich ist das Ergebnis 2013 mit Sonderaufwendungen in Höhe von rund 13,2 Mio. € belastet. Aufgrund der Einstellung der Produktion von Permanent Bond Cluster Systemen⁵ und unter Berücksichtigung der in 2013 vorgenommenen Wertberichtigungen sind aus diesem Bereich zukünftig keine weiteren Verluste mehr zu erwarten. Ohne die angefallenen Sonderaufwendungen würde das EBIT 2013 rund minus 6,2 Mio. € betragen.

Unter Berücksichtigung des zum Jahresende 2013 vorhandenen Auftragsbestands und den verhaltenen Aussichten für die Halbleiter-Equipment-Branche im Jahr 2014 müssen wir damit rechnen, auch in 2014 ein negatives Ergebnis zu erzielen.

Zum 31. Dezember 2013 weist SÜSS MicroTec einen Goodwill in Höhe von rund 15,3 Mio. € aus, der ausschließlich dem Segment Lithografie zuzuordnen ist. Das Segment Lithografie erwirtschaftet mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes und ein positives Segmentergebnis. Das Segment Lithografie wird auch im nächsten Jahr mehr als die Hälfte des gesamten Konzernumsatzes erwirtschaften und weiterhin profitabel sein. Für Wertminderungen im Segment Lithografie sehen wir daher keine Anzeichen.

Segment Substrat Bonder

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war das Segment Substrat Bonder erneut defizitär. Im Ergebnis des Segments Substrat Bonder sind die Sonderaufwendungen in Höhe von 13,2 Mio. € im Zusammenhang mit der Einstellung der Produktion von Permanent Bond Cluster Systemen erfasst. Im Einzelnen wurden Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten von 1,2 Mio. €, Wertberichtigungen auf Vorratsbestände und Kundenforderungen von 9,3 Mio. € bzw. 0,5 Mio. € sowie Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen von 2,2 Mio. € erfasst. Bereinigt um diese Sondereffekte belief sich das EBIT des Segments Substrat Bonder auf minus 8,5 Mio. €. In diesem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis sind auch die in 2013 unterjährig angefallenen negativen Margen der Permanent Bond Cluster Systeme enthalten.

Auch in 2014 wird das Segment Substrat Bonder ein negatives Ergebnis erzielen. Die noch im aktuellen Auftragsbestand abgebildeten Permanent Bond Cluster Systeme, die in 2014 bei den Kunden installiert werden, werden zwar zum Substrat-Bonder-Umsatz 2014 beitragen, jedoch keinen Beitrag zur Marge des Segments

⁵ vgl. Ad-Hoc-Mitteilung der SÜSS MicroTec AG vom 6. November 2013

leisten. Die für das kommende Jahr erwarteten Umsätze für Temporary Bonding und De-Bonding werden noch kein hohes Niveau erreichen und damit kein positives Ergebnis erzielen.

Generell wird die 3D-Integration für die Volumenproduktion bei unseren Kunden noch nicht eingesetzt. Zudem besteht das Risiko, dass sich am Markt andere Technologien und Prozesse durchsetzen werden als die, die von SÜSS MicroTec entwickelt wurden und angeboten werden. Der Erfolg unserer Technologie des Temporary Bonding und De-Bonding hängt entscheidend davon ab, ob sich die von uns entwickelten Technologien und Prozesse am Markt durchsetzen und ob sich die 3D-Integration in der industriellen Fertigung für die Volumenproduktion etablieren wird. Nur durch den Verkauf hoher Stückzahlen werden wir zukünftig im Segment Substrat Bonder unsere Margen verbessern und nachhaltig positive Ergebnisse erzielen können.

Einstellung von Permanent Bond Cluster Systemen

Mit der Einstellung der Produktion von Permanent Bond Cluster Systemen hat SÜSS MicroTec sein Produktportfolio um eine Produktlinie bereinigt, die in der Vergangenheit nachhaltig Verluste erzielt und das Konzernergebnis negativ beeinflusst hat. SÜSS MicroTec wird alle Permanent-Bond-Cluster-Systeme, die momentan noch im Auftragsbestand abgebildet sind, vertragsgemäß bei den Kunden installieren. Es besteht jedoch das Risiko, dass die Wettbewerbsfähigkeit von SÜSS MicroTec durch diese strategische Maßnahme negativ beeinträchtigt werden könnte. Möglicherweise ergeben sich auch negative Auswirkungen auf das Geschäft mit unseren anderen Produktlinien. Diesem Risiko begegnen wir, indem wir uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren und unsere Kunden mit hoher Qualität und hochwertiger Technologie zufriedenstellen.

Segment Lithografie: SÜSS MicroTec Photonic Systems

Das Segment Lithografie hat in 2013 ein EBIT von 3,2 Mio. € und damit eine EBIT-Marge von 3,6 % erzielt. In 2012 konnte noch eine EBIT-Marge von 20,9 % erzielt werden. Im Segment Lithografie ist seit März 2012 auch das Geschäft der SÜSS MicroTec Photonic Systems erfasst, die Produktlinien für UV-Projektionsbelichtung und Laser-Prozessierung entwickelt und vertreibt. In 2013 konnte mit diesen Produktlinien kein positives Ergebnis erzielt werden. SÜSS MicroTec Photonic Systems erzielte in 2013 Umsätze von 11,6 Mio. € und steuerte ein negatives EBIT von minus 5,1 Mio. € zum Konzernergebnis bei. Darin sind einmalige Erträge aus der Auflösung einer Earn-Out-Verpflichtung in Höhe von 2,1 Mio. € enthalten. Aus dem operativen Geschäft der SÜSS MicroTec Photonic Systems resultiert in 2013 somit ein EBIT von minus 7,2 Mio. €. Ein positiver Ergebnisbeitrag kann mit den Photonic-Systems-Produktlinien nur erzielt werden, wenn es SÜSS MicroTec gelingt, die Scanner-Systeme erfolgreich am Markt zu platzieren und ein deutlich höheres Volumen zu erreichen. Hierfür müssen zunächst aus den momentan laufenden Evaluierungsprozessen Aufträge gewonnen werden.

Preisdruck

Im jetzigen Marktumfeld besteht unverändert ein deutlicher Preisdruck. Dieser beinhaltet das Risiko, dass auch bei sich erholenden Märkten ursprüngliche Zielverkaufspreise nicht mehr erzielt werden können. Diesem Risiko begegnen wir mit einer stetigen Preispolitik. So verzichten wir bei unattraktiven Konditionen auch

auf Aufträge, um bei sich erholenden Märkten den Kunden gegenüber eine konsistente Preisgestaltung zu gewährleisten.

Rechtliche Risiken, insbesondere Haftungsrisiken

Die Produkte von SÜSS MicroTec werden durch ein umfassendes Risiko- und Qualitätsmanagement regelmäßig analysiert, kontrolliert und optimiert. Aufgrund des Einsatzes der Produkte im Produktionsumfeld von Unternehmen mit wachsenden Anforderungen an die Produktqualität kann sich das Haftungsrisiko für SÜSS MicroTec erhöhen. SÜSS MicroTec verfügt, neben anderen Versicherungen, über eine Produkthaftpflichtversicherung für die Gruppe, die das potenzielle Risiko soweit möglich limitiert.

BETRIEBLICHE CHANCEN

Segment Substrat Bonder

Wir gehen fest davon aus, dass sich bei unseren Kunden in den kommenden Jahren die 3D-Integration für die industrielle Fertigung und Volumenproduktion durchsetzen wird. Mit den von uns entwickelten Technologien und Prozessen für Temporary Bonding und De-Bonding sehen wir uns sehr gut gerüstet für die kommenden Herausforderungen. Sollte die von uns erwartete Entwicklung so eintreten, sehen wir uns in der Lage, mit unseren Produktlinien im Temporary-Bonding- und De-Bonding-Bereich einen substantiellen Umsatzbeitrag und – bedingt durch hohe Volumina – positive Margen zu erzielen.

Segment Lithografie: SUSS MicroTec Photonic Systems

Mit den Technologien der SUSS MicroTec Photonic Systems – der UV-Projektionsbelichtung und der Laser-Prozessierung – haben wir unser Produktportfolio im Bereich Lithografie ergänzt und erweitert. In 2013 haben wir mehrere Laser-Tools (ELP300) erfolgreich bei Kunden installiert und haben in ungewöhnlich kurzer Zeit von den Kunden eine Abnahme ohne Beanstandungen erzielt. Wir sehen die Chance, in den kommenden Monaten weitere Aufträge für Laser-Tools zu gewinnen und damit die Marktposition der SUSS MicroTec Photonic Systems weiter zu stärken.

Die von SUSS MicroTec Photonic Systems ebenfalls entwickelten und produzierten Scanner-Systeme (DSC300, DSC500) müssen am Markt noch Fuß fassen. Es gibt allerdings bereits vielversprechende Anfragen für diese Systeme. Derzeit evaluiert einer unserer großen Kunden intensiv einen DSC300. Sollte dieser Evaluierungsprozess erfolgreich abgeschlossen werden, erwarten wir weitere positive Impulse im Marktumfeld und gehen davon aus, dass sich auch andere Kunden für diese Technologie entscheiden werden. Damit könnten wir in den nächsten Jahren substantielle Auftragsvolumen und Umsätze mit diesen Systemen erzielen. Bei entsprechend hohen Stückzahlen könnten zukünftig nachhaltig positive Margen erreicht werden.

FINANZMARKTRISIKEN

Kreditrisiken

Ein Kreditrisiko ist der unerwartete Verlust an Zahlungsmitteln oder Erträgen. Dieser tritt ein, wenn der Kunde nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen innerhalb der Fälligkeit nachzukommen, oder die als Sicherheit dienenden Vermögenswerte an

Wert verlieren. Das Unternehmen hat eine konzernweit gültige Richtlinie zum Thema „Credit Assessment“ implementiert. Diese Richtlinie legt für die einzelnen Vertriebsseinheiten des Unternehmens fest, welche Zahlungsbedingungen und Zahlungsabsicherungen im Einzelfall unter Berücksichtigung kunden- und länderspezifischer Aspekte vereinbart werden. Aufträge mit Kunden, die in sogenannten „Risk Countries“ angesiedelt sind, können demzufolge nur gegen Anzahlung des gesamten Auftragswertes, einer Bankgarantie oder eines Letter of Credit abgewickelt werden. Im Fall von Kunden, die in sogenannten „Non Risk Countries“ ansässig sind und eine bestimmte Größenordnung überschreiten, wird ein entsprechendes Kundenrating erstellt. Die Ratings beruhen auf den Angaben externer Kreditratingagenturen. Je nach Einstufung des Kunden sind für die Auftragsabwicklung abgestufte Zahlungskonditionen bzw. -Absicherungen notwendig.

Vom Bruttobestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 12,9 Mio. € (Vorjahr: 22,4 Mio. €) sind zum Bilanzstichtag insgesamt 6,1 Mio. € (Vorjahr: 15,5 Mio. €) der Forderungen weder überfällig noch wertgemindert. Bei diesen Forderungen lagen zum 31. Dezember 2013 keine Anhaltspunkte vor, dass Zahlungsausfälle eintreten werden.

Die Altersstruktur der überfälligen, aber nicht wertgeminderten Forderungen stellt sich zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag wie folgt dar:

	2013	2012
Altersanalyse der überfälligen Forderungen ohne Wertberichtigung		
1 - 30 Tage	2.232	1.439
31 - 60 Tage	294	458
61 - 90 Tage	1.038	3.636
91 - 180 Tage	226	105
Überfällige Forderungen ohne Wertberichtigung	3.790	5.638

Insgesamt sind zum Bilanzstichtag 3,0 Mio. € (Vorjahr: 1,3 Mio. €) des Bruttoforderungsbestands überfällig und wertberichtigt. In dem Betrag sind auch Forderungen von 1,1 Mio. € für zwei spezielle Kundenprojekte berücksichtigt, bei denen die vertraglich zugesicherten Spezifikationen noch nicht erreicht werden konnten.

Die Altersstruktur der überfälligen und wertberichtigten Forderungen zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag ist in folgender Tabelle dargestellt:

	2013	2012
Altersanalyse der überfälligen Forderungen mit Wertberichtigungen		
< 91 Tage	73	0
91 - 180 Tage	767	368
181 - 360 Tage	1.404	535
> 360 Tage	765	366
Überfällige Forderungen mit Wertberichtigung	3.009	1.269

Weitere Informationen zur Bestimmung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen finden sich im Konzernanhang.

Liquiditätsrisiken

Zum Jahresende weist der SÜSS MicroTec-Konzern einen Net Cash Bestand von 35,7 Mio. € aus (Vorjahr: 32,3 Mio. €). Der Free Cashflow (bereinigt um Effekte aus Wertpapiererwerben und Wertpapierverkäufen) belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 4,1 Mio. € (Vorjahr: minus 4,5 Mio. €).

Mit Kreditvertrag vom 23. / 28. Oktober 2013 hat die SÜSS MicroTec AG bei der IKB Deutsche Industriebank AG ein Darlehen über 7,5 Mio. € aufgenommen, das der Finanzierung des neu erworbenen Betriebsgrundstücks in Garching dient und eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2021 aufweist. Zusammen mit dem bereits bestehenden Bankdarlehen bei einer lokalen Volksbank, das der Finanzierung des Betriebsgrundstücks Sternenfels dient, weist der SÜSS MicroTec Konzern zum 31.12.2013 Bankverbindlichkeiten von 11,5 Mio. € aus. Die jährliche Tilgung für die beiden Darlehen wird sich für die kommenden Jahre auf 1,2 Mio. € pro Jahr belaufen. Zudem fallen für die beiden Darlehen bankübliche Zinsen an.

Derzeit stellen drei Banken der SÜSS MicroTec Lithography GmbH im Rahmen eines Bankenkonsortiums Kredit- und Avallinien von insgesamt 4,5 Mio. €. Diese Kredit- und Avallinien werden bis auf weiteres gewährt. Eine weitere Kreditlinie in Höhe von 1,0 Mio. € steht der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG zur Verfügung. Darüber hinaus besteht im Rahmen eines Kautionsversicherungsvertrages ein weiterer Bürgschaftsrahmen in Höhe von 2,5 Mio. €, der von der SÜSS MicroTec Lithography GmbH und der SÜSS MicroTec Reman GmbH genutzt werden kann. Diese Kredit- und Avallinien nutzen wir derzeit, um Anzahlungsbürgschaften im operativen Geschäft zu stellen. Zum 31. Dezember 2013 sind diese Kredit- und Avallinien lediglich in Höhe von 3,3 Mio. € in Form von Avalen in Anspruch genommen.

Wir gehen fest davon aus, dass wir damit auch zukünftig alle erforderlichen Anzahlungsbürgschaften stellen können.

Die Minimierung der Abhängigkeit, insbesondere von kurzfristigem Fremdkapital, soll ein potenzielles Finanzierungsrisiko gering halten. Wir begegnen diesem Risiko vor allem durch das Ziel, mit entsprechenden Cashflows auch aus der Optimierung des Working Capital den Anteil des Fremdkapitals auf niedrigem Niveau zu halten. Weitere Einzelheiten zur Liquiditätssituation der Gesellschaft finden sich unter Textziffer (24) des Konzernanhangs.

Marktpreisrisiken

Marktpreisschwankungen können für das Unternehmen signifikante Cashflow- sowie Gewinnrisiken zur Folge haben. Änderungen der Fremdwährungskurse und der Zinssätze beeinflussen sowohl das weltweite operative Geschäft als auch die Investitions- und Finanzierungsalternativen.

SÜSS MicroTec ist im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit aufgrund der internationalen Ausrichtung Fremdwährungsrisiken ausgesetzt. Die Währungssicherung erfolgt auf Basis bestehender Fremdwährungsaufträge. Für Aufträge, die binnen drei bzw. sechs Monaten abgearbeitet werden, beträgt die

Sicherungsquote rund 65 % bzw. 45 %. Gegenläufige Zahlungsströme, die sich insbesondere aus Fremdwährungsbestellungen von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ergeben, werden von dem so ermittelten zu sichernden Fremdwährungsbetrag abgesetzt. Als Sicherungsinstrumente werden Devisentermingeschäfte genutzt. Für weitere Einzelheiten verweisen wir auf den Konzernanhang unter Textziffer (30).

Eine günstige Entwicklung der Fremdwährungskurse kann zu höheren Margen einzelner Aufträge führen und zusätzliche Kursgewinne generieren.

Die Fremdwährungssensitivität wird durch die Aggregation der Fremdwährungspositionen des operativen Geschäfts und des Konzern-Treasury ermittelt. Dabei werden die Fremdwährungsrisiken durch Simulation einer zehnprozentigen Abwertung aller Fremdwährungen gegenüber dem Euro berechnet. Diese simulierte Abwertung hätte zum Bilanzstichtag zu einer Reduzierung der Euro-Gegenwerte in Höhe von 114 Tsd. € (Vorjahr: Reduzierung um 217 Tsd. €) und einer entsprechenden Verringerung (Vorjahr: Verringerung) des Jahresergebnisses geführt.

Die folgenden Tabellen zeigen die Zusammensetzung des Fremdwährungsexposures und die Auswirkungen auf das Jahresergebnis zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag:

	2013		
	USD	JPY	Summe
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.615	609	4.224
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.575	805	2.380
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.351	-114	-1.465
Kundenanzahlungen	-3.861	-26	-3.887
Netto-Exposure	-22	1.274	1.252
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10%iger Aufwertung des Euro	2	-116	-114

	2012		
	USD	JPY	Summe
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.681	1.811	3.492
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.635	544	3.179
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.138	-138	-1.276
Kundenanzahlungen	-2.851	-156	-3.007
Netto-Exposure	327	2.061	2.388
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10%iger Aufwertung des Euro	-30	-187	-217

Das Zinsänderungsrisiko des Unternehmens ist begrenzt, da auf das variabel verzinsten Darlehen im Zusammenhang mit der Grundstücksfinanzierung Sternenfels ein laufzeitkongruenter Zinsswap gelegt wurde. Ursprünglich variable Konditionen wurden dadurch in fixe Konditionen eingetauscht. Das Darlehen im Zusammenhang mit der Grundstücksfinanzierung Garching ist mit einem fixen Zinssatz belegt.

Das Unternehmen hält festverzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, die zu jeder Zeit über eine Bank oder über die Börse veräußert werden können. Der Kurs ist unter anderem auch beeinflusst durch das aktuelle Marktzinsniveau. Sollte das Unternehmen Wertpapiere vor dem Ende der Laufzeit veräußern (z. B. zur Deckung

eines ungeplanten Liquiditätsbedarfs, der nicht durch freie Mittel gedeckt werden kann), könnten ungeplante Kursverluste entstehen.

Gesamtrisiko

Im Konzern wurden im Geschäftsjahr 2013 keine bestandsgefährdenden Risiken identifiziert. Der Fortbestand des Unternehmens war unter Substanz- und Liquiditätsgesichtspunkten zu keiner Zeit gefährdet.

PROGNOSEBERICHT

Insgesamt sehen die Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute nach einigen schwierigen Jahren wieder positiv aus. Seit Mitte 2013 hat sich laut der „Gemeinschaftsdiagnose 2013“ führender deutscher Wirtschaftsforschungsinstitute die anziehende Konjunktur in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften sehr positiv auf das Weltwirtschaftsklima ausgewirkt. Die wirtschaftliche Situation in den Industrieländern wird zwar weiterhin durch die Folgen der Finanzkrise belastet, aber die Zeichen stehen auf Erholung. In den Schwellenländern dagegen setzte sich die Verlangsamung des Wachstums fort und erreichte laut Schätzungen des International Monetary Fund im Jahr 2013 ein Plus von 4,7 %. Mögliche Gründe hierfür sind durch anziehende Inflationssorgen steigende Leitzinsen in vielen Schwellenländern sowie das Auslaufen verschiedener Konjunkturprogramme in China. Für das Gesamtjahr 2013 prognostiziert der International Monetary Fund in seinem World Economic Outlook ein Weltwirtschaftswachstum um 3,0 %, für 2014 geht man von einem beschleunigten Wachstum um 3,7 % aus.

Europa wird nach einem moderaten Jahr 2013 voraussichtlich wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren und das Bruttoinlandsprodukt soll erwartungsgemäß um 1,0 % zulegen. Insbesondere die Krisenländer des Euroraumes haben Fortschritte bei der Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit sowie der Umsetzung von Sparmaßnahmen erzielt. Obwohl ein Ende der Euro-Krise weiterhin nicht abzusehen ist, so scheinen die Anstrengungen zur Krisenbewältigung erste Früchte zu tragen. In Ländern wie Griechenland, Italien oder Spanien, dürften die weiterhin nötigen Anpassungsprozesse einem kräftigen Wirtschaftswachstum im Wege stehen.

Für Deutschland erwartet der Sachverständigenrat eine weitere Aufhellung der konjunkturellen Lage. Nach einem moderaten Wachstum von 0,4 % im Jahr 2013 werden für 2014 ein Anspringen der Konjunktur und damit ein Wachstum von rund 1,6 % erwartet. Getragen wird dieser Aufschwung insbesondere durch erstarkte Nachfrageimpulse aus dem Inland. Der erwartete Beschäftigungsstand ist weiterhin hoch und das historisch niedrige Zinsniveau erleichtert es den Unternehmen, kreditfinanzierte Investitionen zu tätigen. Die positiven Konjunkturaussichten spiegeln sich auch am Aktienmarkt wieder. In Deutschland hat der Leitindex DAX im Dezember 2013 die 9.500er Marke durchbrochen und neue Rekordstände erreicht.

HALBLEITERINDUSTRIE

Der gesamte Halbleitermarkt ist im Geschäftsjahr um 4,8 % gewachsen. Das Gesamtvolumen wuchs von 291,6 Mrd. USD im Jahr 2012 auf rund 305,6 Mrd. USD im letzten Jahr (Quelle: Semiconductor Industry Association). Getragen wurde das Wachstum durch eine starke Nachfrage nach DRAM und NAND Speicherbausteinen für die Segmente Smartphones und Tablet Computer. Ohne diese beiden Bereiche hätte die gesamte Halbleiterindustrie im Jahr 2013 kein Wachstum verzeichnen können (Quelle: Gartner).

Für das Geschäftsjahr 2014 erwarten die Analysten der Bank of America einen erneuten Anstieg der Nachfrage im Halbleitersegment. Der Markt soll nach rund fünf Prozent im Jahr 2013 um mehr als zehn Prozent im Jahr 2014 wachsen. Die wesentlichen Wachstumstreiber werden weiterhin Speicherelemente für Smartphones und Tablet Computer, aber auch Bausteine für Logik- und analoge Anwendungen sein. Der PC-Markt wird sich voraussichtlich auch im Jahr 2014 verhalten entwickeln und lediglich ein Wachstum von rund zwei Prozent erreichen.

Wie sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat, ist die Prognosegenauigkeit aufgrund der Besonderheiten und der ausgeprägten Zyklizität im Halbleiterbereich sehr begrenzt, so unterscheiden sich die Schätzungen der Marktforschungsinstitute zum Jahresende 2013 deutlich von den eigenen Schätzungen zum Jahresanfang. Vor diesem Hintergrund stellen die nun folgenden Ausführungen Einschätzungen dar, die auf Basis der zum derzeitigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden, aber keine Garantie für das tatsächliche Eintreten der Prognosen bieten.

HALBLEITER-EQUIPMENT-INDUSTRIE

Der Branchenverband semi hat in einer Analyse des Auftragsverhaltens im Equipment-Bereich festgestellt, dass große Investitionen in Kapazitätserweiterungen und der Aufbau neuer Fabriken in den letzten beiden Jahren eher schwach ausgeprägt war. Derzeit bewegt man sich auf einem niedrigen Investitionsniveau, wie es in Zeiten der Finanzkrise um das Jahr 2009 der Fall war. Investitionen werden überwiegend für Upgrades an bestehenden Produktionslinien vorgenommen. Neben der weiterhin vorherrschenden Marktunsicherheit sind die deutlich angestiegenen Kosten, die bei einem Aufbau neuer Fabriken entstehen, ein möglicher Grund für ein zögerliches Investitionsverhalten.

Der Markt für Halbleiter Equipment wies entsprechend erneut einen Rückgang aus. Im Jahr 2013 ist laut Gartner die Nachfrage nach Halbleiter Equipment insgesamt um rund 8,5 % gegenüber Vorjahr gesunken (2012: minus 16,1%). Marktforscher Gartner erwartet nach zwei schwierigen Jahren mit rückläufigem Geschäftsvolumen einen Anstieg der Nachfrage nach Halbleiter Equipment um 15,8 % im Jahr 2014. Für 2015 erwartet Gartner ein weiteres Wachstum um 17,0 %. Ein erheblicher Anteil der Nachfrage wird aus Taiwan, Korea sowie der Region Nordamerika kommen.

ERWARTETE ENTWICKLUNG IN DEN HAUPTMÄRKTEN

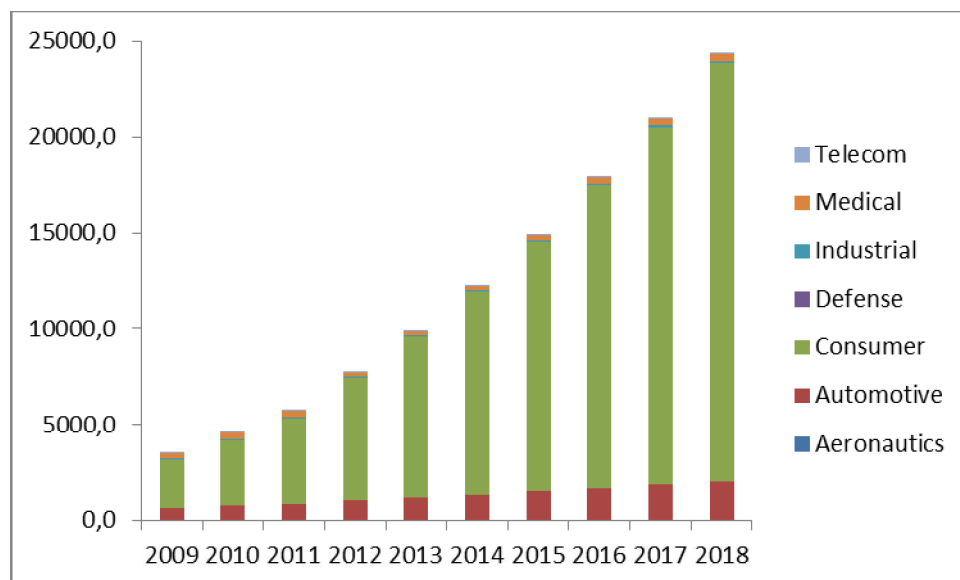
MARKT FÜR MIKROSYSTEMTECHNIK (MEMS)

Mit dem deutlichen Anstieg der Verkaufszahlen für Smartphones und Tablet Computern sowie mobilen Navigationsgeräten hat sich die Nachfrage nach MEMS-Sensoren, insbesondere Gyroskopen, Beschleunigungssensoren und elektronischen Kompassen, in den letzten Jahren spürbar erhöht und wird auch zukünftig weiter ansteigen. Einen weiteren vielversprechenden Wachstumsbereich stellen die MEMS-Mikrofone dar. Laut dem Marktforschungsinstitut Yole verwenden hochwertige Smartphones mittlerweile bis zu drei MEMS-Mikrofone, dazu gehören neben der klassischen Mikrofonfunktion Anwendungen wie Spracherkennung oder Geräuschunterdrückung. Auch in Spielekonsolen und anderen Konsumelektronikgeräten kommen verstärkt MEMS-Bausteine zum Einsatz.

Die Grafik zeigt deutlich, dass sich der Bereich Konsumelektronik bisher am dynamischsten entwickelt hat und auch zukünftig der größte Anwendungsbereich sein wird. Yole schätzt das durchschnittliche jährliche Wachstum des gesamten MEMS-Marktes in den Jahren 2012 bis 2018 auf über 20 %. Bei der Interpretation der Marktzahlen ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Equipment-Markt in diesem Bereich weniger schnell wächst, als der MEMS-Markt selbst, da durch die gesteigerte Produktivität der Fertigungssysteme eine stets höhere Anzahl an MEMS-Bauteilen pro Maschine gefertigt werden kann.

In Millionen Einheiten, Quelle: Yole 2013

(Excel Daten in separater Datei verfügbar)



ADVANCED PACKAGING UND 3D-INTEGRATION

Laut Aussage des Branchenverbands Semi werden aktuell rund 80 % aller Mikrochips über das herkömmliche Verdrahten (Wire Bonding) mit der Außenwelt verbunden. Die verbleibenden 20 % der Chips werden über sogenannte fortschrittliche Verpackungstechnologien (Advanced Packaging) mit der Außenwelt verbunden. Neben kürzeren Verbindungswegen und einer höheren Verbindungsgeschwindigkeit, ist ein weiterer Vorteil der geringere Platzverbrauch, welcher bei

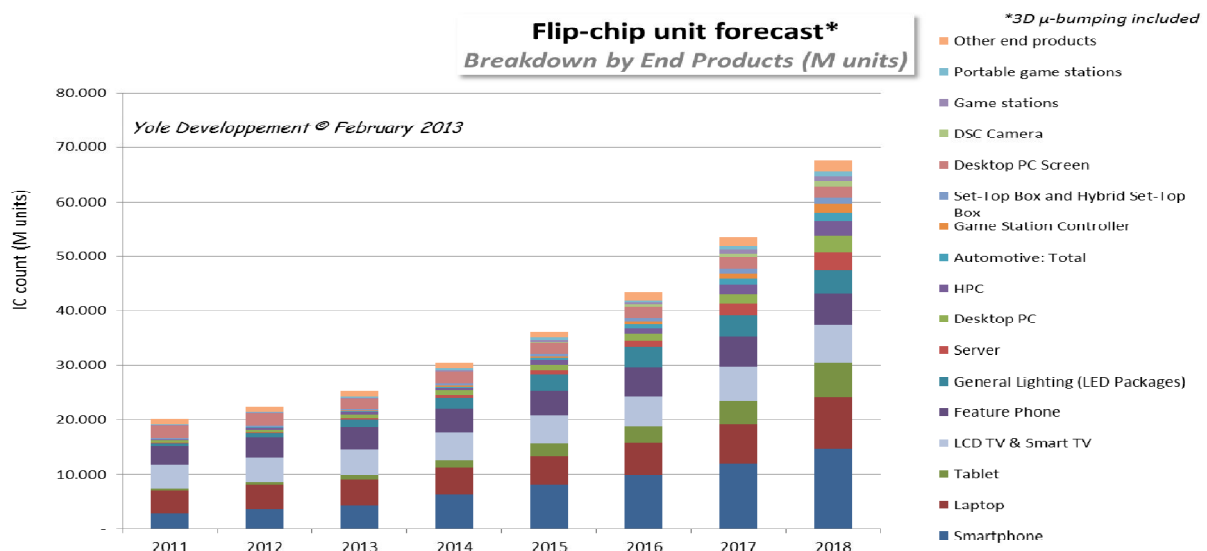
Smartphones und Tablet Computern eine wichtige Rolle spielt. Ohne Advanced Packaging-Technologien könnten darüber hinaus die schlanken Formfaktoren von Smartphones und Tablet Computern nicht dargestellt werden.

Unter den Advanced Packaging-Technologien subsummiert man heute verschiedene Technologien, wie beispielsweise das Wafer-Level-Packaging (Kontaktierung findet statt, während die einzelnen Chips sich noch auf dem Wafer befinden) mit seinen Unterformen fan-in und fan-out, Flip Chip-Bonding, Wafer-Level-Chip-Scale-Packaging sowie die 2,5D Integration und die 3D Integration. SÜSS MicroTec ist insbesondere mit seinen Lithografie- und Temporary Bonding-Lösungen in diesem Feld aktiv.

Die Flip Chip Verpackungstechnologie hat in den letzten Jahren bereits eine sehr dynamische Entwicklung vollzogen und ist für SÜSS MicroTec ein sehr bedeutendes Marktsegment. Marktforscher von Yole Developpement erwarten auch zukünftig nennenswertes Wachstum in diesem Bereich.

In Millionen Einheiten, Quelle: Yole Februar 2013

(Excel Daten in separater Datei verfügbar)



Die 3D Integration ist eine Weiterführung der heute im Volumen eingesetzten Verpackungstechnologien, hierbei werden gedünnte Mikrochips übereinander gestapelt und durch sogenannte TSVs (Thru Silicon Vias) miteinander verbunden. Die entscheidenden Vorteile sind die hohe Packungsdichte und die enorme Komplexität, die auf kleinstem Raum erreicht werden kann. Durch die 3D Integration ist es zudem möglich verschiedene Funktionalitäten, wie beispielsweise Speicher und Prozessor, in einem Package zu vereinigen. Bisher fanden diese Prozesse ausschließlich im forschungsnahen Umfeld statt. Im Jahr 2013 ist es SÜSS MicroTec jedoch gelungen, den weltweit ersten Auftrag für Geräte zur Pilotproduktion von gestapelten Chips zu verbuchen. Der Kunde wird 2014 mit der Pilotserienproduktion sowie der Prozessoptimierung beginnen. Nach Abschluss dieser Phase erfolgt üblicher Weise der Übergang zur Volumenproduktion, wie schnell dieser Übergang erfolgen wird ist allerdings zum heutigen Zeitpunkt sehr schwer zu prognostizieren.

VERBINDUNGSHALBLEITER LED (LEUCHTDIODEN)

SÜSS MicroTec konzentriert sich im Markt für Verbindungshalbleiter auf das Wachstumssegment LEDs (Leuchtdioden) und adressiert mit seinen Produktlösungen insbesondere Hersteller von höherwertigen Leuchtdioden, sogenannte High-Brightness (HB)- und Ultra-High-Brightness (UHB)-LEDs.

Im Prognosebericht 2012 haben wir von der Erwartung, dass die Umsätze mit LEDs ab 2013 wieder steigen, berichtet. Rückblickend lässt sich festhalten, dass das Marktvolumen von 2012 auf 2013 deutlich angestiegen ist und dass die Schätzungen für 2014 einen weiteren Wachstumsschub vorhersagen (siehe Grafik).

Marktvolumen Packages LEDs in Mio. USD (Quelle: Yole 2008 – 2013e; LEDinside für 2014e)

2008	2009	2010	2011	2012	2013e	2014e
5767	6217	10000	10209	11413	12704	17800

Neben LEDs für die Hintergrundbeleuchtung von Fernsehgeräten rückt das Thema generelle Beleuchtung immer mehr in den Vordergrund. Fallende Preise für LEDs im Zusammenhang mit der überzeugenden Lebensdauer und der guten Lichtausbeute haben einen Austausch anderer Leuchtmittel gegen LEDs auch für Privathaushalte attraktiver gemacht. Während für den globalen LED-Markt ein Wachstum von rund 68 % erwartet wird, liegen die erwarteten Wachstumsraten für 2014 in Nordamerika bei plus 72 % und in China bei plus 86 %.

ENDOGENE INDIKATOREN

Kundenzufriedenheit ist ein bedeutender Erfolgsfaktor in der Halbleiterbranche. Aufgrund der außerordentlichen Leistungen der SÜSS MicroTec-Mitarbeiter konnte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2013 von zwei namhaften asiatischen Packaging Häusern, SPIL und Amkor, eine Auszeichnung für unsere herausragenden Leistungen als Zulieferer bekommen.

Produkt- und Prozessinnovationen sowie die Erschließung neuer Marktsegmente sind ein weiterer Erfolgsfaktor für das Unternehmen. Produktseitig konnten wir im Geschäftsjahr 2013 verschiedene sehr zukunftssträchtige Aufträge für unser Bonder-Segment verbuchen. Im März 2013 hat ein führender asiatischer IDM einen Folgeauftrag für die neueste Generation von Produktions-Bondclustern bei uns platziert. Die Systeme wurden für das temporäre Bonden von 300 mm-Wafern für 3D-Integrationsprozesse bei Logik- und Speicheranwendungen konfiguriert. Daneben haben wir im Verlauf des Geschäftsjahres 2013 mehrere Aufträge für das ELP300 Excimer Laser-Stepper System von SÜSS MicroTec Photonic Systems erhalten. Zu den Kunden gehören zwei US-amerikanische IDMs sowie ein asiatischer OSAT und das Fraunhofer IZM, Berlin. Mit Hilfe der Lasertechnologie können, unter Umgehung der herkömmlichen Lithografie- und Ätzverfahren, Mikrostrukturen direkt auf dem Substrat hergestellt werden. Dies sind zwei wichtige Beispiele, die die Innovationskraft und die technologische Überlegenheit von SÜSS MicroTec-Maschinen unter Beweis stellen.

Ohne den Einsatz und die Schaffenskraft der Mitarbeiter wären diese Leistungen nicht möglich gewesen. Wir haben uns mit dem Erwerb der Immobilie am Standort Garching neben der Mietersparnis ein hohes Maß an operationaler Flexibilität im Hinblick auf unternehmensspezifische Anforderungen an die Immobilie gesichert und bekennen uns klar zur Produktion in Garching.

Am 6. November 2013 hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass aufgrund einer Neubewertung der Geschäftssituation im Bereich Permanentes Bonding und der weiterhin unbefriedigenden Ertragslage in dieser Produktlinie, die im zweiten Quartal dieses Jahres eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen erweitert werden und die Produktion von Permanenten Bond Cluster Systemen eingestellt wird. Die am Markt erfolgreichen manuellen Permanent Bonding Systeme waren von dieser Maßnahme nicht betroffen. Mit Vollzug dieser Maßnahme erwartet das Unternehmen eine deutliche Reduzierung der Verluste im Segment Substrat Bonder.

GESAMTAUSSAGE ZUR VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG DES KONZERNS

Zum Jahresende 2013 beträgt der Auftragsbestand rund 85,7 Mio. €. Auf Basis dieses Auftragsbestands und der erwarteten Auftragseingangsentwicklung für das erste Halbjahr 2014 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz für das Geschäftsjahr 2014 in der Bandbreite zwischen 135 Mio. € und 145 Mio. € und ein Ergebnis (EBIT) zwischen minus 5 und 0 Mio. €. Im Geschäftsjahr 2013 wurde mit einem Umsatz in Höhe von 134,5 Mio. € ein Ergebnis (EBIT) von minus 19,4 Mio. € erwirtschaftet. Das EBIT für das Geschäftsjahr 2013 beinhaltet einen Sondereffekt für die Restrukturierung des Segments Substrat Bonder in Höhe von 13,2 Mio. €, das Unternehmen erwirtschaftete somit im Berichtsjahr ein operatives Ergebnis von minus 6,2 Mio. €.

Das Segment Lithografie wird auch in 2014 geprägt sein durch die weiterhin schwierige Auftragslage im Bereich der margenstarken 300mm Geräte sowie die Ergebnisbelastungen durch SUSS MicroTec Photonic Systems (vormals Tamarack Scientific). Gleichwohl wird das Segment Lithografie wieder den größten Umsatz- und Ergebnisbeitrag für den Konzern liefern. Wir erwarten gegenüber 2013 eine Umsatzsteigerung zwischen 5 und 10 Prozent und einen gegenüber dem Vorjahr verbesserten EBIT im mittleren bis höheren einstelligen Millionenbereich. Im Segment Substrat Bonder erwarten wir einen leichten Umsatzanstieg bei gleichzeitiger Ergebnisverbesserung, jedoch mit einem weiterhin negativen EBIT im mittleren einstelligen Millionenbereich. Die Umsätze des Segments Fotomasken Equipment werden im kommenden Jahr ein Niveau leicht unter 2013 erreichen bei einem ausgeglichenen EBIT. Am Ziel, das organische Wachstum unseres Basisgeschäfts ohne zusätzliche Fremdmittel bestreiten zu können, halten wir weiterhin fest.

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Lagebericht, der mit dem Konzernlagebericht zusammengefasst ist, der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind.

Garching, den 10. März 2014

SÜSS MicroTec AG

Der Vorstand



Frank Averdung



Michael Knopp

Zukunftsgerichtete Angaben

Dieser Bericht enthält Angaben und Prognosen, die sich auf zukünftige Entwicklungen des SÜSS MicroTec-Konzerns und seiner Gesellschaften beziehen. Die Prognosen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum derzeitigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die den Prognosen zu Grunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder Risiken – wie die im Risikobericht angesprochenen – eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Garching, 10. März 2014
Der Vorstand



Frank Averdung
Vorstandsvorsitzender



Michael Knopp
Finanzvorstand

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der SÜSS MicroTec AG, Garching, der mit dem Konzernlagebericht zusammengefasst ist, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

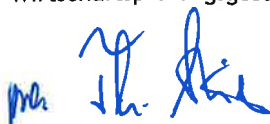
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

München, 21. März 2014

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



ppa. T. Steiner
Wirtschaftsprüfer



S. Spitzer
Wirtschaftsprüfer



